PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2005-182164

(43) Date of publication of application: 07.07.2005

(51)Int.Cl.

GO6T 7/40 G06T 1/00 3/00 GO6T 7/00 GO6T GO6T 7/60 1/387 HO4N

(21)Application number : 2003-418272

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

16.12.2003

(72)Inventor: TSUJITA KOSUKE

TAKEUCHI SATORU **KUNIHAZAMA AKIMI INOUE YASUAKI**

(54) IMAGE AREA DETERMINATION METHOD, AND IMAGE AREA DETERMINATION APPARATUS, IMAGE CORRECTION APPARATUS, AND DIGITAL WATERMARK EXTRACTION APPARATUS CAPABLE OF USING **METHOD**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve a problem wherein watermark detection from a picked-up image of a print image embedded with a digital watermark requires high precision extraction of an original image area from the picked-up image.

SOLUTION: An edge detection filter part 42 detects edges of an original image area included in a picked-up image to determine points on the edges as vertex search start points Vs. An edge tracking part 44 tracks the edge lines from the vertex search start points Vs in the directions of vertices of the original image area to determine end points of the edge lines and set them as tentative vertices Ve of the original image area. A Fourier transform processing part 46 applies the Fourier transform processing to the surrounding images of the tentative vertices Ve. A phase angle calculation part 47 calculates phase angles of low frequency components after the Fourier transform. A vertex displacement adjustment part 48 computes the displacements of the tentative vertices Ve from true vertex positions according to the calculated phase angles to determine final detection vertices Vf displacementadjusted from the tentative vertices Ve. An image area extraction part 41 extracts the original image area from the picked-up image according to the coordinate values of the final detection vertices Vf.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection] [Date of extinction of right]

(19) 日本国特許厅(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特**第2005-18216**4 (P2005-182164A)

最終頁に続く

(43) 公開日 平成17年7月7日(2005.7.7)

					` '				
(51) Int.C1.7		F I	· ·		·		テーマコード(参考)		
GO6T	7/40	GOGT	7/4	40	В		5B057		
GO6T	1/00	GOGT	1/0	00	310Z		5CO76		
GO6T	3/00	GO6T	1/0	00	500B		5L096		
GO6T	7/00	GOGT	3/0	00	200				
GO6T	7/60	GO6T	7/0	00	300H				
		審査請求 未	請求	請求	項の数 13	OL	(全 31 頁)	最終頁に続く	
(21) 出願番号		特願2003-418272 (P2003-418272)	(71)	人顧出	0000018	389			
(22) 出題日		平成15年12月16日 (2003.12.16)	` ′		三洋電		· 会社		
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号						
			(74)	代理人	1001059	924			
					弁理士	森下	賢樹		
			(72)	発明者	注田 注	孝介			
					大阪府4	京市口节	京阪本通2丁目	5番5号 三	
					洋電機	株式会社	土内		
			(72)	発明者	f 竹内 f	香			
					大阪府4	表面口管	京阪本通2丁目	5番5号 三	
					洋電機		土内		
			(72)	発明者					
								5番5号 三	
					洋電機	宋式会社	生内		

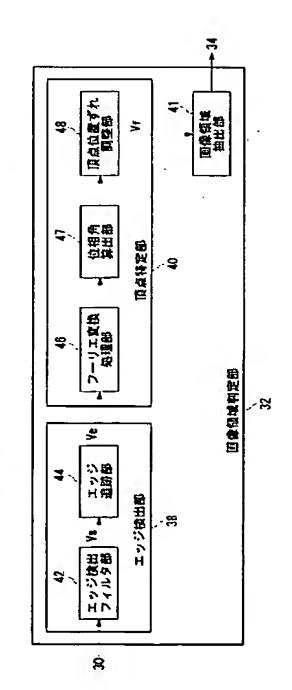
(54) 【発明の名称】画像領域判定方法、ならびにその方法を利用可能な画像領域判定装置、画像補正装置および電子 透かし抽出装置

(57)【要約】

【課題】 電子透かしの埋め込まれた印刷画像の撮影画像から透かしを検出するためには、撮影画像から原画像領域を高精度で抽出しなければならない。

【解決手段】 エッジ検出フィルタ部42は、撮影画像に含まれる原画像領域のエッジを検出し、エッジ上の点を頂点探索開始点Vsとして求める。エッジ追跡部44は、頂点探索開始点Vsから原画像領域の頂点方向にエッジラインを追跡し、エッジラインの端点を求め、原画像領域の暫定頂点Veとする。フーリエ変換処理部46は、暫定頂点Veの周辺の画像にフーリエ変換処理を施す。位相角算出部47は、フーリエ変換後の低周波数成分の位相角を算出する。頂点位置ずれ調整部48は、算出された位相角にもとづき、真の頂点位置からの暫定頂点Veのずれを求め、暫定頂点Veの位置ずれを調整した最終検出頂点Vfを求める。画像領域抽出部41は、最終検出頂点Vfの座標値をもとに撮影画像から原画像領域を抽出する。

【選択図】 図5



【特許請求の範囲】

【請求項1】

原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得する画像入力部と、

前記撮影画像における検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定する画像領域判定部とを含むことを特徴とする画像領域判定装置。

【請求項2】

前記画像領域判定部は、前記検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角にもとづいて、前記原画像領域のエッジを検出するエッジ検出部を含むことを特徴とする請求項1に記載の画像領域判定装置。

【請求項3】

前記画像領域判定部は、前記検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角にもとづいて、前記原画像領域の頂点の位置を特定する頂点特定部を含むことを特徴とする請求項1または2に記載の画像領域判定装置。

【請求項4】

前記エッジ検出部により検出されたエッジの端点を前記原画像領域の暫定的な頂点として、前記暫定的な頂点付近の検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角にもとづいて、前記暫定的な頂点の位置ずれを調整する頂点特定部を含むことを特徴とする請求項2に記載の画像領域判定装置。

【請求項5】

前記頂点特定部は、前記原画像領域の暫定的な頂点付近の検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角と、前記暫定的な頂点の位置に前記原画像領域の真の頂点があると仮定した場合の参照画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角との差にもとづいて、前記暫定的な頂点の真の位置からのずれを求めることを特徴とする請求項3または4に記載の画像領域判定装置。

【請求項6】

原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得する画像入力部と、

前記撮影画像における検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定する画像領域判定部と、

判定された前記原画像領域の撮影による歪みを補正する画像補正部とを含むことを特徴とする画像補正装置。

【請求項7】

電子透かしが埋め込まれた原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得する画像入力部と、

前記撮影画像における検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定する画像領域判定部と、

判定された前記原画像領域の撮影による歪みを補正する画像補正部と、

補正された前記原画像領域から前記電子透かしを抽出する抽出部とを含むことを特徴とする電子透かし抽出装置。

【請求項8】

原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得するステップと、

前記撮影画像における検査点付近の画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定するステップとを含むことを特徴とする画像領域判定方法。

【請求項9】

前記原画像領域を判定するステップは、前記検査点付近の画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の実軸成分が実質的に零である場合に、前記検査点が前記原画像領域のエッジ上にあると判定するエッジ検出ステップを含むことを特徴とする請求項8に記載の画像領域判定方法。

【請求項10】

50

10

20

30

前記原画像領域を判定するステップは、前記検査点を前記エッジに沿って走査しながら前記エッジ検出ステップを繰り返すことにより、エッジラインを追跡するステップをさらに含むことを特徴とする請求項9に記載の画像領域判定方法。

【請求項11】

前記原画像領域を判定するステップは、前記原画像領域の暫定的な頂点付近の画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角と、前記暫定的な頂点の位置に前記原画像領域の真の頂点があると仮定した場合の参照画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角との差にもとづいて、前記暫定的な頂点の真の位置からのずれを求めるステップを含むことを特徴とする請求項8から10のいずれかに記載の画像領域判定方法。

【請求項12】

前記原画像領域を判定するステップは、前記エッジラインの追跡により得られる前記エッジラインの端点を前記原画像領域の暫定的な頂点として、前記暫定的な頂点付近の画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角と、前記暫定的な頂点の位置に前記原画像領域の真の頂点があると仮定した場合の参照画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角との差にもとづいて、前記暫定的な頂点の真の位置からのずれを求めることを特徴とする請求項10に記載の画像領域判定方法。

【請求項13】

電子透かしが埋め込まれた原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得するステップと、

前記撮影画像における検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定するステップと、

判定された前記原画像領域の撮影による歪みを補正するステップと、

補正された前記原画像領域から前記電子透かしを抽出するステップとをコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[00001]

本発明は、画像処理技術に関し、特に電子透かしの埋め込まれた印刷画像を撮影した画像の原画像領域を判定する画像領域判定方法、ならびにその方法を利用可能な画像領域判定装置、画像補正装置および電子透かし抽出装置に関する。

【背景技術】

[00002]

電子透かしが埋め込まれたデジタル画像を印刷媒体に印刷し、印刷された画像をデジタルカメラやスキャナ等で撮影して再度デジタル化して埋め込まれた電子透かしを検出するシステムがある。たとえば、チケットやカードを利用者に発行する際に、発行者や利用者に関する識別情報などを電子透かしとして視覚的に検知できないように画像に埋め込んでチケットやカードに印刷する。チケットやカードの利用時に、その電子透かしを検出することにより、偽造や不正入手などの不正行為を防止することができる。また、複写機やプリンタで画像を印刷する際に、著作権情報や機器の識別番号等を電子透かしとして埋めこんで印刷することにより、著作物、有価証券等の不正コピーを防止することができる。

[0003]

一般にデジタルカメラやスキャナを用いて印刷画像を撮影してデジタル化すると、撮影画像には、撮影機器のレンズの形状や焦点距離に依存したレンズ歪みや、撮影時の光軸の傾きに起因する透視歪みが生じ、印刷画像と撮影画像の間で画素のずれが現れる。そのため、印刷画像に埋め込まれた電子透かしを撮影画像から正しく抽出することは困難であり、撮影画像の歪み補正が必要となる。

[0004]

特許文献1には、画像の周囲に基準枠を付加して印刷し、基準枠の付加された印刷画像を撮影して、基準枠をもとに撮影画像の画像領域の大きさを算出し、撮影画像の歪みを補

10

20

30

40

20

30

40

50

正する技術が開示されている。

【特許文献1】特開2003-110846号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

撮影による画像歪みを補正するためには、まず撮影画像に含まれる原画像領域を正確に抽出する必要がある。原画像領域の画像枠をエッジ抽出処理によって抽出するのが一般的であるが、撮影画像には歪みがある上、撮影状況によってはノイズが含まれるため、高精度でエッジを抽出することは難しい。原画像領域を正確に抽出できなかった場合、画像歪みの補正が正しくなされる保証がなくなる。その結果、原画像領域に埋め込まれた電子透かしの検出に失敗したり、検出精度が落ちるなどの問題が生じる。

[0006]

特許文献1に開示された技術では、電子透かしの埋め込まれた画像を印刷する際に、画像の周囲に基準枠を付加して印刷する必要があり、手間がかかり、印刷画像の見映えも悪くなる。

[0007]

本発明はこうした状況に鑑みてなされたもので、その目的は、印刷画像を撮影した画像において原画像領域を簡易な方法で正確に判定することのできる画像領域判定技術を提供することにある。また、別の目的は、その画像領域判定技術を利用して、撮影による画像歪みを補正することのできる画像補正技術、さらには電子透かしの埋め込まれた印刷画像を撮影した画像から電子透かしを高い精度で検出することのできる電子透かし抽出技術を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明のある態様は画像領域判定装置に関する。この装置は、原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得する画像入力部と、前記撮影画像における検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定する画像領域判定部とを含む。前記画像領域判定部は、前記検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角にもとづいて、前記原画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角にもとづいて、前記原画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角にもとづいて、前記原画像領域の頂点の位置を特定する頂点特定部を含んでもよい。

[0009]

空間周波数領域への変換には、たとえばフーリエ変換を用いることができる。印刷媒体を撮影すると、原画像の印刷領域の周辺の余白部分も合わせて撮影されるため、撮影画像から余白部分を取り除いた原画像領域を抽出することが必要になるが、この構成によれば、空間周波数領域における周波数成分を用いて頂点やエッジなどの原画像領域の特徴点を検出するため、撮影画像に含まれるノイズの影響を受けることなく、撮影領域から原画像領域を高精度で抽出することができる。

[0010]

前記頂点特定部は、前記原画像領域の暫定的な頂点付近の検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角と、前記暫定的な頂点の位置に前記原画像領域の真の頂点があると仮定した場合の参照画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の位相角との差にもとづいて、前記暫定的な頂点の真の位置からのずれを求めてもよい。この暫定的な頂点は、前記エッジ検出部により検出されたエッジの端点であってもよく、何らかの手法でおおまかに求めたものであってもよい。エッジ検出部により検出されるエッジの端点が原画像領域のおおよその頂点の位置を与えるものであっても、頂点特定部はその頂点の位置の精度を改善することができる。

[0011]

本発明の別の態様は画像補正装置に関する。この装置は、原画像が印刷された印刷媒体

の撮影画像を取得する画像入力部と、前記撮影画像における検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定する画像領域判定部と、判定された前記原画像領域の撮影による歪みを補正する画像補正部とを含む。

[0012]

本発明のさらに別の態様は電子透かし抽出装置に関する。この装置は、電子透かしが埋め込まれた原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得する画像入力部と、前記撮影画像における検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定する画像領域判定部と、判定された前記原画像領域の撮影による歪みを補正する画像補正部と、補正された前記原画像領域から前記電子透かしを抽出する抽出部とを含む。

[0013]

本発明のさらに別の態様は画像領域判定方法に関する。この方法は、原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得するステップと、前記撮影画像における検査点付近の画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定するステップとを含む。

[0014]

前記原画像領域を判定するステップは、前記検査点付近の画像領域を空間周波数領域に変換した場合の低周波数成分の実軸成分が実質的に零である場合に、前記検査点が前記原画像領域のエッジ上にあると判定するエッジ検出ステップを含んでもよい。「実質的に零である」とは、ノイズの影響を考慮した誤差の範囲で、零に近いことをいう。

[0015]

前記原画像領域を判定するステップは、前記検査点を前記エッジに沿って走査しながら前記エッジ検出ステップを繰り返すことにより、エッジラインを追跡するステップをさらに含んでもよい。ここで「エッジに沿って走査」とは、エッジに平行に走査するだけではなく、所定の幅でエッジと垂直な方向への走査も組み合わせて走査することも含める。エッジに沿った走査により、エッジラインの端点に到達すると、その端点が原画像領域の頂点の暫定的な位置を与える。

[0016]

本発明のさらに別の態様はコンピュータプログラムに関する。このプログラムは、電子透かしが埋め込まれた原画像が印刷された印刷媒体の撮影画像を取得するステップと、前記撮影画像における検査画像領域を空間周波数領域に変換した場合の周波数成分の位相にもとづいて、前記撮影画像における原画像領域を判定するステップと、判定された前記原画像領域の撮影による歪みを補正するステップと、補正された前記原画像領域から前記電子透かしを抽出するステップとをコンピュータに実行させる。

[0017]

なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

【発明の効果】

[0018]

本発明によれば、印刷画像を撮影した画像において原画像領域を高精度で判定することができる。それにより、撮影による歪みを正確に補正することができ、また、電子透かしの埋め込まれた印刷画像を撮影した画像の場合、原画像領域から電子透かしを高い精度で検出することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0019]

本発明の実施の形態に係る電子透かしシステムは、図1の電子透かし埋め込み装置100と図3の電子透かし抽出装置200とを含み、電子透かし埋め込み装置100によって電子透かしの埋め込まれた印刷画像が生成され、電子透かし抽出装置200によって印刷

10

20

30

40

20

30

40

50

画像を撮影して、埋め込まれた電子透かしが抽出される。電子透かし埋め込み装置100は、たとえば、チケットやカードの発行に用いられ、電子透かし抽出装置200は、チケットやカードの偽造を発見するために用いられる。どちらの装置もネットワーク上の端末からアクセスされるサーバとして構成してもよい。

[0020]

図1は、実施の形態に係る電子透かし埋め込み装置100の構成図である。これらの構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされた画像処理機能および電子透かし埋め込み機能のあるプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組み合わせによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。

[0021]

画像形成部10は、入力されたデジタル画像 I を印刷時の解像度に変換する。埋め込み部12は、画像形成部10によって印刷時の解像度に変換されたデジタル画像 I に透かし情報 X を埋め込む。

[0022]

印刷部14は、埋め込み部12により透かし情報 X が埋め込まれたデジタル画像 I を紙やカードなどの印刷媒体に印刷し、印刷画像 P を生成する。なお、同図では、印刷部14は電子透かし埋め込み装置100の構成要素であるが、印刷部14を電子透かし埋め込み装置100の外部に設け、プリンタによって構成してもよく、その場合は、電子透かし埋め込み装置100とプリンタは、周辺機器の接続ケーブルまたはネットワークで接続される。

[0023]

図2は、出力された印刷画像 P を説明する図である。印刷媒体 2 4 上に電子透かしの埋め込まれたデジタル画像 I (原画像ともいう)が印刷されており、原画像の印刷された領域 2 0 (以下、単に原画像領域 2 0 という)の周囲には通常、印刷媒体 2 4 の余白部分が存在する。

[0024]

図3は、実施の形態に係る電子透かし抽出装置200の構成図である。これらの構成も、CPU、メモリなどのハードウエア、画像処理機能および電子透かし抽出機能のあるソフトウエアの任意の組み合わせによっていろいろな形で実現することができる。

[0025]

撮影部30は、電子透かし埋め込み装置100により生成された印刷画像Pを撮影し、印刷画像Pをデジタル化する。同図では、撮影部30は電子透かし抽出装置200の構成要素であるが、撮影部30を電子透かし抽出装置200の外部に設け、デジタルカメラやスキャナによって構成してもよく、その場合は、電子透かし抽出装置200と、デジタルカメラまたはスキャナは、周辺機器の接続ケーブルまたはネットワークで接続される。特にデジタルカメラに無線通信機能がある場合は、デジタルカメラで取り込まれた撮影画像が無線で電子透かし抽出装置200に送信される。

[0026]

図4は、撮影された印刷画像 P を説明する図である。撮影部 3 0 は、印刷画像 P を撮影するとき、印刷媒体 2 4 の原画像領域 2 0 全体を撮影するが、通常、原画像領域 2 0 の周囲の余白部分も撮影する。すなわち撮影領域 2 6 は、一般に、印刷媒体 2 4 上で原画像領域 2 0 よりも広い範囲である。このように撮影部 3 0 による撮影画像には、印刷媒体 2 4 の余白部分も含まれているため、原画像領域 2 0 の切り出しが必要となる。

[0027]

図3の画像領域判定部32は、撮影部30により取り込まれた撮影画像に含まれる原画像の領域を判定し、図4の撮影領域26から余白部分を取り除いた原画像領域20を抽出する。

20

40

50

[0028]

図5は、画像領域判定部32の詳細な構成を説明する図である。エッジ検出部38は、撮影部30により撮影された撮影領域26に含まれる原画像領域20のエッジを検出し、さらにそのエッジを追跡してエッジの端点を取得する。頂点特定部40は、エッジ検出部38が取得したエッジの端点をもとに、原画像領域20の頂点の位置を特定する。画像領域出部41は、頂点特定部40により特定された頂点にもとづいて撮影領域26から原画像領域20を抽出し、画像補正部34に与える。

[0029]

エッジ検出部38と頂点特定部40の構成を詳しく説明する。エッジ検出部38のエッジ検出フィルタ部42は、撮影領域26に対してエッジ検出フィルタによるエッジ検出処理を施して、撮影領域26内の原画像領域20のエッジを検出し、最初に検出したエッジ上の点を頂点探索開始点Vsとしてエッジ追跡部44に与える。エッジ追跡部44は、フーリエ変換処理などにより、頂点探索開始点Vsから原画像領域20の頂点方向にエッジラインを追跡することで、エッジラインの端点を検出し、その端点を原画像領域20の暫定頂点Veとして頂点特定部40に与える。

[0030]

頂点特定部40のフーリエ変換処理部46は、暫定頂点Veの周辺の画像にフーリエ変換処理を施す。位相角算出部47は、フーリエ変換後の低周波数成分の位相角を算出する。頂点位置ずれ調整部48は、算出された位相角にもとづき、真の頂点位置からの暫定頂点Veのずれを求め、暫定頂点Veの位置ずれを調整した最終検出頂点Vfを求め、画像領域抽出部41に与える。

[0031]

画像領域抽出部41は、最終検出頂点Vfの座標値をもとに撮影領域26から原画像領域20を抽出し、画像補正部34に与える。画像領域抽出部41は、最終検出頂点Vf以外に、エッジ検出部38により検出されるエッジも利用して、原画像領域20を抽出してもよい。

[0032]

図6は、エッジ検出部38および頂点特定部40により原画像領域20が判定される様子を説明する図である。撮影領域26は長方形EFHG、原画像領域20は長方形ABDCで図示されている。撮影領域26の長方形EFHGの大きさは、縦height画素、横width画素である。以下では、横方向をx軸、縦方向をy軸とする座標系を設定する。

[0033]

エッジ検出部38のエッジ検出フィルタ部42は、撮影領域26の中心Oを求め、撮影領域26の左上の頂点Eから中心Oに向けて、傾きθのエッジ走査方向50を定める。エッジ検出フィルタ部42は、頂点Eからエッジ走査方向50に沿って撮影領域26を走査し、エッジ検出フィルタなどを用いて、原画像領域20のエッジを検出する。これにより、エッジ走査方向50と原画像領域20の辺ACとの交点Iにおいて、最初にエッジが検出される。この交点Iが頂点探索開始点Vsである。

[0034]

その後、エッジ追跡部44は、左向きに頂点走査方向52を定め、点 I から頂点走査方向52に沿って撮影領域26を走査し、フーリエ変換処理などを利用して、原画像領域20のエッジラインを追跡する。エッジ追跡部44による頂点走査方向52に沿ったエッジラインの追跡は、エッジラインの端点が検出された時点で停止する。この端点が暫定頂点Veである。

[0035]

さらに、頂点特定部40は、エッジ追跡部44により得られた暫定頂点Veの位置ずれを調整して、原画像領域20の頂点Aの座標を最終検出頂点Vfとして求める。

[0036]

なお、エッジ追跡部44が頂点Aを探索する向きは、同図の例では左向きであったが、

20

40

50

エッジ走査方向50が原画像領域20の辺ABと交わる場合は、頂点Aを探索する向きは、上向きとなることに留意する。

[0037]

撮影領域26の右下の頂点Hを走査開始点として、原画像領域20の右下の頂点Dを探索する場合は、エッジ検出フィルタ部42は、エッジ走査方向54に沿った走査により、原画像領域20の辺CD上の点Lにおいて最初にエッジを検出する。エッジ追跡部44は、下向きに頂点走査方向56を定め、点Lから頂点走査方向56に沿ってエッジラインを追跡し、辺CDの端点付近で停止し、暫定頂点Veを取得する。頂点特定部40は、暫定頂点Veの位置ずれを調整して、原画像領域20の頂点Dを最終検出頂点Vfとして求める。

[0038]

ここでも、エッジ追跡部44が頂点Dを探索する向きは、同図の例では下向きであったが、エッジ走査方向54が原画像領域20の辺BDと交わる場合は、頂点Dを探索する向きは、右向きとなることに留意する。

[0039]

撮影領域26の左下の頂点Fを走査開始点として、原画像領域20の左下の頂点Bを探索する場合、撮影領域26の右上の頂点Gを走査開始点として、原画像領域20の右上の頂点Cを探索する場合も同様の処理が行われる。

[0040]

図3の画像補正部34は、画像領域判定部32により抽出された原画像領域20の歪み補正を行う。撮影部30によって印刷画像Pを取り込む際、撮影画像にはレンズ歪みや透視歪みが生じる。画像補正部34は、埋め込まれた電子透かしを正確に抽出できるように、画像に生じた歪みを補正する。

[0041]

図7(a)、(b)は、原画像領域20の歪みを説明する図である。図7(a)は、撮影による歪みのない理想的な状態の原画像領域20を示したものであり、矩形ABDCは長方形である。図7(b)は、撮影による歪みのある原画像領域20を示したものである。デジタルカメラで撮影した場合、印刷媒体24を正確に真上から撮影することは難しく、光軸のずれにより透視歪みが生じる。ここでは透視歪みを強調して矩形ABDCを図示しているが、一般にはレンズの歪曲収差により樽型や糸巻き型のレンズ歪みも生じている。画像補正部34は、図7(b)のような歪みの生じた矩形ABDCを4頂点の座標値を用いて幾何変換することにより、図7(a)の歪みのない長方形ABDCに変形する。

[0042]

図3の透かし抽出部36は、画像補正部34によって歪み補正された原画像領域20の透かし埋め込み領域から透かしビットを検出することにより、透かし情報Xを抽出する。透かしビットを検出する際、埋め込み領域に歪みがあると、透かしの検出が困難になるが、画像補正部34により歪みが補正されているため、透かしの検出精度が保証される。

[0043]

以上の構成による電子透かし抽出装置200による電子透かし抽出手順を説明する。

[0044]

図8は、電子透かし抽出手順の全体的な流れを示すフローチャートである。撮影部30は印刷画像Pを撮影する(S10)。画像領域判定部32は画像領域判定処理を行い、撮影画像から原画像領域20を抽出する(S12)。画像補正部34は、原画像領域20に画像補正処理を施し、撮影による歪みを補正する(S14)。透かし抽出部36は、補正後の原画像領域20から透かし情報Xを検出する処理を行う(S16)。

[0045]

図9は、図8の画像領域判定処理S12の大まかな流れを示すフローチャートである。 エッジ検出部38のエッジ検出フィルタ部42は、撮影領域26に含まれる原画像領域2 0のエッジを検出する処理を行う(S20)。エッジ追跡部44は、原画像領域20のエッジラインを追跡して、エッジラインの端点を原画像領域20の暫定頂点Veとして取得

20

30

40

50

する処理を行う(S22)。頂点特定部40は、暫定頂点Veをもとに、原画像領域20の頂点の位置を正確に特定する処理を行う(S24)。

[0046]

図10は、図9のエッジ検出処理S20の詳細な手順を示すフローチャートである。エッジ検出フィルタ部42は、撮影領域26のサイズ(width, height)を取得し(S30)、撮影領域26のアスペクト比width/heightを算出する(S32)。また、エッジ検出フィルタの出力値の閾値Tを設定する(S34)。

[0047]

エッジ検出フィルタ部42は、走査開始点の座標(i, j)を設定する(S 3 6)。走査開始点は、図 5 に示す撮影領域 2 6 の 4 隅 E、 F、 G、 H のいずれかに設定される。ここでは、左上の頂点 E を走査開始点として設定し、左上の頂点 A を検出する場合を説明する。 x 座標値 i にアスペクト比w i d t h / h e i g h t を加算し、y 座標値 j に 1 を加算することにより、検査点(i, j)を定め、走査開始点から撮影画像の中心に向かう走査方向に沿って探索を進める(S 3 8)。

[0048]

なお、左下の頂点Fを走査開始点として設定し、左下の頂点Bを検出する場合は、x座標値iにアスペクト比width/heightを加算し、y座標値jから1を減算することにより、検査点(i, j)を定める。また、右上の頂点Gを走査開始点として設定し、右上の頂点Cを検出する場合は、x座標値iからアスペクト比width/heightを減算し、y座標値jに1を加算することにより、検査点(i, j)を定める。また、右下の頂点Hを走査開始点として設定し、右下の頂点Dを検出する場合は、x座標値iからアスペクト比width/heightを減算し、y座標値jから1を減算することにより、検査点(i, j)を定める。

[0049]

エッジ検出フィルタ部42は、検査点(i, j)を中心とする小領域にエッジ検出フィルタを施し、エッジ検出フィルタによる出力値Pを計算する(S 4 0)。出力値Pが閾値Tを超えた場合(S 4 2 の Y)、エッジが検出されたと判定し、エッジ方向を特定し(S 4 4)、エッジが検出されたときの検査点の座標(i, j)を頂点探索開始点Vsの座標(is, js)として取得する(S 4 6)。出力値Pが閾値Tを超えない場合(S 4 2 の N)、ステップS 3 8 に戻り、検査点の座標値をインクリメントして、さらにエッジ検出フィルタによる走査を続ける。

[0050]

図11(a)~(d)は、エッジ検出フィルタを説明する図である。エッジ検出フィルタ部42は、テンプレート・マッチングの方法を用いたエッジ検出フィルタリングを行う。具体的には、エッジ検出フィルタの一例として、Prewittオペレータを用いて、エッジラインとエッジ方向を検出する。同図には、Prewittオペレータのマスクパターンと、そのマスクパターンにより検出されるエッジパターンが示されている。

[0051]

図11(a)は、上向きのエッジを検出するためのマスクパターン60と、そのマスクパターン60により検出されるエッジパターン61である。エッジ検出フィルタ部42は、検査点を中心とする縦横3画素の検査領域にこのマスクパターン60を適用し、検査領域内の各画素の画素値にマスクパターン60のマスクの値を乗じて和をとることで、出力値Pを計算する。出力値Pが閾値Tよりも大きい場合、検査点がエッジライン上にあり、同図に示す上向きのエッジパターン61が検出されたと判定する。ここで、エッジの向きは、エッジラインに垂直であって、画素の暗い方から明るい方に向かう方向、すなわち輝度値の小さい方から輝度値の大きい方に向かう方向に定義されることに注意する。

[0052]

同様に、図11(b)は、下向きのエッジを検出するためのマスクパターン62と、それにより検出されるエッジパターン63、図11(c)は、左向きのエッジを検出するためのマスクパターン64とそれにより検出されるエッジパターン65、図11(d)は、

20

50

右向きのエッジを検出するためのマスクパターン66とそれにより検出されるエッジパターン67を示す。

[0053]

図10のステップS40~S44では、エッジ検出フィルタ部42は、検査点(i, j)を中心とする縦横3画素の検査領域に対して、撮影領域26の左上の隅Eから走査を開始する場合は、図11(a)、図11(c)に示す上向き、左向きのエッジを検出するマスクパターン60、64を適用して、それぞれの出力値Pを計算し、いずれかのマスクパターンによる出力値Pが閾値Tを超えた場合に、エッジが検出されたものと判定し、閾値Tを超えた方のマスクパターンにより、エッジの方向を特定する。すなわち、エッジが検出された時点で検査点Vはエッジライン上にあり、エッジが上向きか左向きかが特定され、このときの検査点Vの座標(i, j)が頂点探索開始点Vsの座標(i, j。)となる。

[0054]

同様に、撮影領域26の左下の隅下から走査を開始する場合は、エッジ検出フィルタ部42は、図11(b)、図11(c)に示す下向き、左向きのエッジを検出するマスクパターン62、64を適用して出力値Pを計算する。また、撮影領域26の右上の隅Gから走査を開始する場合は、図11(a)、図11(d)に示す上向き、右向きのエッジを検出するマスクパターン60、66を適用して出力値Pを計算する。撮影領域26の右下の隅Hから走査を開始する場合は、図11(b)、図11(d)に示す下向き、右向きのエッジを検出するマスクパターン62、66を適用して出力値Pを計算する。

[0055]

図12(a)、(b)は、エッジ検出フィルタにより原画像領域20のエッジが検出される様子を説明する図である。図12(a)では、撮影領域26の左上の頂点Eからエッジ走査方向50に沿って、上向きのエッジを検出するマスクパターン60と左向きのエッジを検出するマスクパターン64とが検査点Vを中心とする検査領域に適用され、検査点Vが原画像領域20の上辺に到達したときに、上向きのエッジを検出するマスクパターン60による出力値Pが閾値Tを超え、上向きのエッジ方向70が検出される。このときの検査点Vを頂点探索開始点Vsとする。

[0056]

同様に、図12(b)では、撮影領域26の右下の頂点Hからエッジ走査方向54に沿って、下向きのエッジを検出するマスクパターン62と右向きのエッジを検出するマスクパターン66とが検査点Vを中心とする検査領域に適用され、検査点Vが原画像領域20の右辺に到達したときに、右向きのエッジを検出するマスクパターン66による出力値Pが閾値Tを超え、右向きのエッジ方向72が検出される。このときの検査点Vを頂点探索開始点Vsとする。

[0057]

図13は、図9のエッジライン追跡処理S22の詳細な手順を説明するフローチャートである。エッジ追跡部44は、図10のエッジ検出処理S20で最終的に得られた頂点探索開始点Vsの座標(i。,j。)を検査点Vの座標(i,j)に代入する(S50)。エッジ検出のために画像領域を走査する幅(以下、単に走査幅という)dを所定の値に設定する(S51)。図10のエッジ検出処理S20で特定されたエッジ方向が横向きである場合(S52のY)、縦方向走査処理を行い(S54)、エッジ方向が横向きでない場合(S52のN)、横方向走査処理を行う(S56)。縦方向走査処理S54または横方向走査処理S56により、原画像領域20のエッジラインが追跡され、エッジラインの端点が暫定頂点Veの座標(i。,j。)として取得される(S58)。

[0058]

図14は、図13の縦方向走査処理S54の詳細な手順を説明するフローチャートである。この縦方向走査処理S54では、エッジ検出部38が、図15に示す縦横N画素の検査領域80を空間周波数領域に変換したときの低周波数成分の位相角に基づいて、原画像領域20のエッジを検出する。なお、一例としてNは16である。なお、ここでは、左上

の頂点Aを検出する場合を説明する。

[0059]

ステップS60では、エッジ追跡のスタート位置が設定される。前記頂点探索開始点Vsのx座標、y座標をそれぞれ(i, j)としたとき、エッジ追跡のスタート位置である検査点Vのx座標、y座標はそれぞれ、(iーd/2, j)に設定される。なお、一例として、走査幅dは8であり、前記Nより小さい値に設定される。なお、図15において、紙面右側がiの正方向であり、紙面下側がjの正方向である。

[0060]

ステップS62では、エッジ追跡部44により、前記検査点Vを中心とする縦横N画素の検査領域80にフーリエ変換処理が施される。ここで、検査領域80の各画素の輝度値をh(x、y)とし、検査領域80にフーリエ変換処理として離散フーリエ変換を行った結果をH(u, v)とすると、H(u, v)は、式(1)のように表現される。

H (u, v)

 $= \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} \{h'(x, y) \in x p [-i 2\pi (ux + vy) / N] \}$ $u, v = 0, 1, 2, \dots, N-1 (1)$

但し、

h'(x, y) = h(x-i+(N+d)/2, y-j+N/2)

なお、式(1)において、指数関数 e x p [] の中で用いられるi は虚数単位であり、 x 座標値を表すi とは区別される。

[0061]

ステップS64では、エッジ追跡部44により、検査領域80のフーリエ変換の水平方向の交流成分における最低周波数成分(以下、最低水平周波数成分という)の実数成分、即ち、H(1,0)の実数成分H,(1,0)が取得される。

[0062]

ここで、式(1)は、次のように変形することができる。

H (u, v)

 $= \sum_{y=0}^{N-1} \{e \times p [-i 2 \pi v y / N] \}$

 $\times \Sigma_{x=0}^{N-1} \{ h'(x, y) e x p [-i 2 \pi u x / N] \}$ (2)

[0063]

したがって、H(1,0)は、

H (1, 0)

 $= \sum_{y=0}^{N-1} \dot{\Sigma}_{x=0}^{N-1} \{h'(x, y) \in x p [-i 2 \pi x / N] \}$ (3)

となる。ところで、h(x,y)が複素数である場合、

 $h(x, y) = h_r(x, y) + i h_i(x, y)$ (4)

と表現することができる。したがって、h (x, y) e x p [-i2 π x/N] は、次式のように変形できる。

h (x, y) exp $[-i 2\pi x/N]$

 $= h (x, y) \{cos[2\pi x/N] - i sin[2\pi x/N] \}$

 $= h_r (x, y) \{cos[2\pi x/N] - isin[2\pi x/N] \}$

 $+h_{i}(x, y) \{sin[2\pi x/N] - icos[2\pi x/N]\}$ (5)

[0064]

ここで、検査領域 8 0 の各画素の輝度値 h (x、y) の虚数成分は 0 であるとすると、h (x, y) e x p $[-i2\pi x/N]$

 $= h_r (x, y) \{cos[2\pi x/N] - isin[2\pi x/N]\}$ (6)

となる。ゆえに、H(1,0)は、

H (1, 0) = $\sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1}$

 $\{h_r'(x,y)(cos[2\pi x/N]-isin[2\pi x/N])\}$ (7)但し、

10

20

30

50

```
h_r'(x, y) = h_r(x-i+(N+d)/2, y-j+N/2)
となる。
[0065]
 また、H(1,0)の実数成分Hょ(1,0)、虚数成分Hょ(1,0)はそれぞれ、
 H_{r}(1, 0)
 = \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} h_r'(x, y) \cos [2\pi x/N]
 H_{i} (1, 0)
 = - \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} h_r, (x, y) \text{ sin } [2 \pi x / N]  (8 i)
となる。
[0066]
                                                                       10
 上記H(1,0)の値は、検査領域80における輝度値h(x、y)の分布によって異
なる。以下3つの例(A)、(B)、(C)を挙げて説明する。
[0067]
  (A) h (x, y) が一様分布のとき
即ち、
 h (x, y) = m 	(9)
 但し、i-N/2 \le x \le i+N/2-1 かつ、
      j - N / 2 \le y \le j + N / 2 - 1
である場合、
 H_{r} (1, 0)
                                                                       20
 = m \Sigma_{y=0}^{N-1} \Sigma_{x=0}^{N-1} cos[2\pi x/N]
 H_{i} (1, 0)
 = - m \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} s i n [2 \pi x / N]
となるが、ここで、
 \Sigma_{x=0}^{N-1} cos [2 \pi x/N] = 0
 \Sigma_{x=0}^{N-1} s in [2\pi x/N]=0
であるから、
H_{r} (1, 0) = H_{i} (1, 0) = 0
となり、H (1,0)の実数成分H_r (1,0)、虚数成分H_i (1,0)は、ともに0
になる。
[0068]
  (B)検査領域80の中央の検査点Vに原画像領域20と余白領域のエッジがある場合
、例えば、
 h (x, y)
        (i - N / 2 \le x \le i - 1, j - N / 2 \le y \le j + N / 2 - 1):
         (i \le x < i + N / 2 - 1, j - N / 2 \le y \le j + N / 2 - 1) (10)
(但し、m」: 余白領域の輝度、m。: 原画像領域20の輝度であり、m、<m。)
のとき、
 H_{r}(1, 0)
 = \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N/2-1} m_1 cos[2\pi x/N]
                                                                       40
  + \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=N/2}^{N-1} m_2 \cos \left[ 2\pi x / N \right]
                                                     (11r)
 H_{i} (1, 0)
 = - \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N/2-1} m_1 \text{ s in } [2 \pi x / N]
   -\Sigma_{y=0}^{N-1}\Sigma_{x=N/2}^{N-1}m_2 \text{ sin } [2\pi x/N]
                                                     (11 i)
[0069]
 ここで、
 \Sigma_{x=0}^{N/2-1} cos [2\pi x/N] = \Sigma_{x=N/2}^{N-1} cos [2\pi x/N]
= 0
であるから、
 H_{r}(1, 0) = 0
                                                                       50
```

40

50

 H_i (1, 0) $= -N \times (m_1 \sum_{x=0}^{N/2-1} sin [2\pi x/N] \\ + m_2 \sum_{x=N/2}^{N-1} sin [2\pi x/N])$ となり、H(1, 0) の実数成分 H_i (1, 0) は0となるが、虚数成分 H_i (1, 0) は0にはならない。

[0070]

(C)検査領域80の中央の検査点Vではないところに原画像領域20と余白領域のエッジがある場合、例えば、

h (x, y)

 $= m_{1} \quad (0 \le x \le N/4 - 1, j - N/2 \le y \le j + N/2 - 1);$ $m_{2} \quad (N/4 \le x < N - 1, j - N/2 \le y \le j + N/2 - 1) \quad (12)$

(但しm₁ ≠ m₂)

である場合、

 $\begin{array}{l} H_{r} & (1, 0) \\ = \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N/4} \prod_{m=1}^{N-1} cos\left[2\pi x/N\right] \\ + \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=N/4}^{N-1} m_{2} cos\left[2\pi x/N\right] \\ H_{i} & (1, 0) \\ = -\sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N/4} \prod_{m=1}^{N-1} sin\left[2\pi x/N\right] \\ - \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=N/4}^{N-1} m_{2} sin\left[2\pi x/N\right] \\ \end{array}$

となり、H (1, 0) の実数成分 H_r (1, 0) 及び虚数成分 H_i (1, 0) は 0 にはならない。

[0071]

ステップS66では、前記H(1,0)が0であるかどうかが評価される。H(1,0)の実数成分H,(1,0)が0でなければ、上記(B)の説明から、前記検査点V(i,j)は、原画像領域20と余白領域のエッジ上にはないものとみなされる。そして、ステップS68へ進み、検査点Vのx座標値iが1だけインクリメントされ、検査点Vがx軸方向に移動される。そして、ステップS62では、新しい検査点Vを中心とする縦横N画素の検査領域80にフーリエ変換処理が施される。

[0072]

上記ステップS66において、H (1,0)の実数成分H, (1,0)が0であれば、前記検査点V(i,j)は、原画像領域20と余白領域のエッジ上にあるものとみなされ、その検査点Vにおいてエッジが検出されたと判定される。

[0073]

なお、図14において、 $H_{1,0}$ は上記 H_{r} (1,0)のことを、 $H_{0,1}$ は H_{r} (0,1)のことを意味している。また、以後の文中で登場する $H_{1,0}$ 及び $H_{0,1}$ も同様のことを意味する。また、以後の文中で登場するフーリエ変換の(1,0)成分、フーリエ変換の(0,1)成分はそれぞれH(1,0)、H(0,1)のことを指すものとする

[0074]

エッジが検出されると、ステップS70では、検査領域80のフーリエ変換の垂直方向の交流成分における最低周波数成分(以下、最低垂直周波数成分という)の実数成分、即ちH(0,1)の実数成分Hړ(0,1)が取得され、記憶される。ここで、ステップS70では、新しく得られた実数成分Hړ(0,1)が次回のステップS70の実行時まで一時的にメモリに記憶され、後述のようにステップS71でその内容が読み出され、ステップS72で実数成分Hړ(0,1)の変化量の計算に利用される。

[0075]

式(8 r)の導出と同様の方法により、 H_r (0, 1)、 H_i (0, 1)は、 H_r (0, 1) $= \Sigma_{x=0}^{N-1} \Sigma_{y=0}^{N-1} h_r$ '(x, y)cos [2 π y / N] (13 r) H_i (0, 1)

•

```
= -\sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} h_r'(x, y) \text{ s in } [2\pi y/N]  (13 i
となる。上記H、(0,1)、H、(0,1)の値も、検査領域80における輝度値h(
x,y)の分布によって異なる。以下3つの例(D)、(E)、(F)の例を挙げて説明
する。
[0076]
  ( D ) 検 査 領 域 8 O の 中 央 の 検 査 点 V に 原 画 像 領 域 2 O と 余 白 領 域 の エ ッ ジ が あ る が 、
検査領域80内に原画像領域20の頂点がない場合、例えば、
 h(x,y)
 = m_1 (i - N / 2 \le x \le i - 1 \, j - N / 2 \le y \le j + N / 2 - 1);
                                                                         10
        (i \le x < i + N / 2 - 1, j - N / 2 \le y \le j + N / 2 - 1) (14)
のとき、
 H_{r}(0,1)
 = \sum_{x=0}^{N/2-1} \sum_{y=0}^{N-1} cos[2\pi y/N]
  + \sum_{x = N/2}^{N-1} m_2 \sum_{y = 0}^{N-1} cos [2\pi y/N] (15r)
 H_{i}(0,1)
 = -\sum_{x=0}^{N/2} \sum_{y=0}^{N-1} m_1 \sum_{y=0}^{N-1} sin [2\pi y/N]
  -\Sigma_{x=N/2}^{N-1}m_2\Sigma_{y=0}^{N-1} sin [2 \pi y/N] (15i)
となる。
[0077]
                                                                         20
 ここで、
 \Sigma_{v=0}^{N-1} cos [2 \pi y/N] = \Sigma_{y=0}^{N-1} sin [2 \pi y/N] = 0
であるから、
 H_{r}(0, 1) = H_{i}(0, 1) = 0
となる。
[0078]
  (E)検査領域80内に原画像領域20の頂点がある場合(但し、検査点Vと頂点は一
致しないものとする)、例えば、
 h (x, y)
 = m_i (i - N / 2 \le x \le i - 1, j - N / 2 \le y \le j + N / 2 - 1);
   m_i (i \le x < i + N/2 - 1, j - N/2 \le y \le j + N/4 - 1);
   m_2 (i \le x < i + N/2 - 1, j + N/4 \le y \le j + N/2 - 1) (16)
のとき、
 H_{r} (0, 1)
 = \sum_{x=0}^{N/2-1} m_1 \sum_{y=0}^{N-1} cos [2\pi y/N]
 +\Sigma_{x=N/2}^{N-1} m_1 \Sigma_{y=0}^{3N/4-1} cos [2 \pi y/N]
 +\Sigma_{x=N/2}^{N-1} m_2 \Sigma_{y=3N/4}^{N-1} cos [2 \pi y/N]
                                                              (17r)
 H; (0, 1)
 = - \sum_{x=0}^{N/2-1} \sum_{y=0}^{N-1} sin [2\pi y/N]
   -\Sigma_{x=N/2}^{N-1}m_{1}\Sigma_{y=0}^{3N/4-1}sin[2\pi y/N]
                                                                         40
   -\Sigma_{x=N/2}^{N-1} m_2 \Sigma_{y=3N/4}^{N-1} sin [2 \pi y/N]
となる。
[0079]
 ここで、
 \Sigma_{y=0}^{N-1} cos [2 \pi y/N] = \Sigma_{y=0}^{N-1} sin [2 \pi y/N] = 0
であるから、
 H, (0, 1)
 = \sum_{x = N/2}^{N-1} m_1 \sum_{y = 0}^{3N/4-1} cos[2\pi y/N]
  +\Sigma_{x=N/2}^{N-1} m_2 \Sigma_{y=3N/4}^{N-1} cos [2 \pi y/N]
 = N / 2 \times (m_1 \Sigma_{y=0}^{3N/4-1} cos[2\pi y/N]
                                                                         50
```

```
+ m_2 \sum_{y=3}^{N-1} cos [2\pi y/N]) (18r)
 H; (0, 1)
  = -\sum_{x = N} \frac{N-1}{2} m_1 \sum_{y = 0} \frac{3N/4 - 1}{N-1} sin [2\pi y/N] 
 -\sum_{x = N} \frac{N-1}{2} m_2 \sum_{y = 3} \frac{N/4}{N-1} sin [2\pi y/N] 
 = -N/2 \times (m_1 \sum_{y = 0} \frac{3N/4 - 1}{N-1} sin [2\pi y/N] 
   + m_2 \Sigma_{y = 3 N / 4}^{N - 1} s i n [2 \pi y / N]) (18 i)
となり、H(0,1)の実数成分H,(0,1)及び虚数成分H,(0,1)は0になら
ない。
[0800]
(F)検査点Vと頂点が一致した場合、即ち、
                                                                       10
 h (x, y)
  = m_1 (i - N / 2 \le x \le i - 1 \, j - N / 2 \le y \le i + N / 2 - 1):
   m_1 (i \le x < i + N / 2 - 1, i - N / 2 \le y \le i - 1):
        (i \le x < i + N / 2 - 1, j \le y \le j + N / 2 - 1) (19)
のとき、
 H<sub>r</sub> (0, 1)
 = \sum_{x=0}^{N/2-1} m_1 \sum_{y=0}^{N-1} cos [2\pi y/N]
  +\Sigma_{x=N/2}^{N-1}m_{1}\Sigma_{y=0}^{N/2-1} cos [2 \pi y/N]
   +\Sigma_{x=N/2} \sum_{y=N/2} \sum_{y=N/2} \sum_{y=N/2} \sum_{y=N/2} \sum_{y=N/2}
                                                          (20r)
 H_{i} (0, 1)
                                                                       20
 = - \sum_{x=0}^{N/2} {n/2} - 1 \quad m_1 \quad \sum_{y=0}^{N-1} s \quad i \quad n \quad [2 \pi y/N]
   -\Sigma_{x=N/2}^{N-1}m_{1}\Sigma_{y=0}^{N/2-1}sin[2\pi y/N]
   -\Sigma_{x=N/2}^{N-1} m_2 \Sigma_{y=N/2}^{N-1} s in [2 \pi y/N]
となる。
[0081]
 ここで、
 \Sigma_{y=0}^{N-1} cos [2 \pi y/N]
 = \sum_{y=0}^{N/2-1} cos[2\pi y/N] = \sum_{y=N/2}^{N-1} cos[2\pi y/N]
  = 0 であり、
                                                                       30
  \Sigma_{v=0}^{N-1} s in [2\pi y/N]=0
であるから、
 H_{r}(0, 1) = 0
 H_{i} (0, 1)
 = -Nm_1 / 2\Sigma_y = 0 N / 2 -1 s in [ 2\pi y / N ]
 = -N m_2 / 2 \Sigma_{y=N/2}^{N-1} s i n [2 \pi y/N]
となる。H(0,1)のうち、実数成分H、(0,1)は0となる。
[0082]
 ステップS71では、前回のステップS70の実行時に記憶したHょ(0,1)がメモ
リから読み出される。ステップS72では、ステップS70において今回新しく取得され
                                                                       40
たH、(0、1)とメモリに記憶されていた前回のH、(0、1)とを比較し、その変化
量が所定の閾値よりも大きいかどうかが評価される。ここで、Hr(0,1)が0でない
場合は、上記(E)の場合に該当する。すなわち、検査領域80内に原画像領域20の頂
点があるということである。ただし、頂点が検査領域80の端付近にある場合は、H, (
0,1)の値は0にはならないものの、大きな値をとることはない。検査点を垂直方向に
ずらしていくにつれ、原画像領域20の頂点は検査領域80の中央部に近づいていくが、
これに伴って、H 、(0,1)は徐々に大きくなっていく。したがって、H 、(0,1)
の変化量が所定の閾値より大きい場合は、原画像領域20の頂点は検査領域80の中央部
に近づいてきたものとみなし、ステップS54の一連の処理は終了する。
```

[0083]

20

40

一方、ステップS72においてH、(0、1)の変化量が所定の閾値以下であると判断された場合は、ステップS74へ進む。ステップS74では、jが1だけデクリメントされる。即ち、検査点Vは、左上の頂点Aを探索するために、図15の紙面上側に移動する。そして、ステップS60以降の処理が繰り返される。

[0084]

図15は、左上の頂点Aを探索する場合における縦方向走査処理S54が行われる様子を説明する図である。図10のエッジ検出処理S20で最終的に得られた頂点探索開始点Vs(i, j)を中心として、エッジ検出処理S20で特定されたエッジ方向74にd画素の幅をもつ走査幅76が設定される。頂点探索開始点Vs(i, j)をエッジ方向74にd/2画素だけずらすことにより、縦方向走査処理S54の走査のスタート位置である検査点V(iーd/2, j)が設定される。エッジ検出部38は、この検査点Vにおいて縦横N画素からなる検査領域80を設定し、検査領域80の画素値をフーリエ変換する。画素数Nはたとえば16に設定される。

[0085]

エッジ検出部38は、検査領域80を検出されたエッジ方向74と平行な走査方向78に1画素ずつシフトさせながらフーリエ変換処理を行い、最低水平周波数成分の実軸成分H₁,0の値が0になることにより、検査点Vが原画像領域20のエッジライン上に到達したことを検出する。検査点Vがエッジライン上に到達すると、エッジ方向とは垂直な走査方向79に沿って、検査領域80を上向きに1画素だけシフトさせ、同じようにd/2だけ検査領域80をずらした位置をスタート位置として、エッジ方向と並行な走査方向78にエッジ検出を続ける。これが、ステップS60~S68の走査処理である。

[0086]

なお、検査領域80を横向き、上向きにシフトさせる量が、1画素でなくてもよく、2 画素以上N画素以下であってもよい。また、二分探索法を用いて走査範囲を絞り込みながら、走査を行ってもよい。

[0087]

なお、図14と図15では、左上の頂点Aを縦方向に探索して検出する場合を説明した。左下の頂点Bを検出する場合は、ステップS74において、検査点Vのy座標値jが1だけインクリメントされるように変更する。また、右上の頂点Cを検出する場合は、ステップS60において、検査点Vのx座標値iがi+d/2に設定され、ステップS68において、検査点Vのx座標値iが1だけデクリメントされるように変更する。また、右下の頂点Dを検出する場合は、ステップS60において、検査点Vのx座標iがi+d/2に設定され、ステップS68において、検査点Vのx座標値iが1だけデクリメントされ、ステップS74において、検査点Vのy座標値jが1だけインクリメントされるように変更する。

[0088]

ところで、輝度値分布が h'(x, y)である縦横 N 画素の検査領域 8 O の座標を x 方向(水平方向)に k だけシフトさせた h'(x - k, y) のフーリエ変換を求めると、次のようになる。

F { h' (x - k, y) } $= \sum_{y=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{x=0}^{N-1} \{ h' (x-k, y) \in xp [-i2\pi (ux+uk+vy)/N] \}$ $= e x p (-i2\pi uk/N) H (u, v) (21)$

[0089]

式(21)は、輝度値分布がk画素分だけx方向(水平方向)にシフトすると、フーリエ変換後の信号空間においては、信号の位相角が2 π uk/Nだけシフトすることを意味する。逆にいえば、フーリエ変換後の信号の位相角のシフト量2 π uk/Nを角周波数 ω =2 π u/Nで除算することにより、原信号のシフト量を求めることができる。

[0090]

なお、上記ステップS66では、検査点Vを中心としたフーリエ変換の実数成分H」

 $_0$ が $_0$ である場合にエッジが検出されたものと判定したが、これに代えて、前記実数成分 $_{1,0}$ が所定の値以下である場合にエッジが検出されたものと判定するものであっても良い。これにより、原画像領域 $_2$ $_0$ 及び余白部分の輝度値が均一でない場合、たとえばノイズに起因し、場所によってばらついている場合でも、エッジ位置を正しく検出することができる。あるいは、実数成分 $_{1,0}$ $_0$ の絶対値が最小となるような前記検査点 $_2$ がエッジ位置であるとみなすものであっても良い。

[0091]

図16(a)~(d)は、検査領域80のフーリエ変換の最低水平周波数成分により横方向のエッジが判定される原理を説明する図である。図16(a)のように、検査領域80の中心点Vがちょうど原画像領域20のエッジライン上に存在するとき、フーリエ変換の最低水平周波数成分である(1,0)成分は、図16(d)に示す実数部を実軸Re、虚数部を虚軸Imにとった座標系の単位円上で、実軸成分が0の虚軸Im上のベクトル90で表される。

[0092]

一方、図16(b)のように、検査領域80の中心点Vが原画像領域20の横方向のエッジラインからk画素だけ左にずれているときは、フーリエ変換の最低水平周波数成分である(1,0)成分は、図16(d)に示すように、Im軸に対して位相角が-ωkをなすベクトル92で表され、このときの実軸成分 H_{1} 0は負である。また、図16(c)のように、検査領域80の中心点Vが原画像領域20の横方向のエッジラインからk画素だけ右にずれているときは、フーリエ変換の最低水平周波数成分である(1,0)成分は、図16(d)に示すように、Im軸に対して位相角がωkをなすベクトル91で表され、このときの実軸成分 H_{1} 0は正である。

[0093]

したがって、フーリエ変換の(1, 0)、成分の実軸成分 $H_{1,0}$ の値が0であれば、そのときの検査領域80の中心点Vがエッジライン上にあると判定でき、(1, 0) 成分の実軸成分 $H_{1,0}$ の値が0でなければ、中心点Vがエッジラインからずれていると判定できる。この性質に基づき、図14のステップS66では、実軸成分 $H_{1,0}$ の値が0であるかどうかでエッジ検出を判定している。なお、実際の検出においては、ノイズによる影響があるため、実軸成分 $H_{1,0}$ の値が正確に0でなくても、0に近い場合に、エッジ検出の判定を行ってよい。

[0094]

エッジ検出の判定精度を高めるため、最低周波数成分(1,0)だけでなく、2番目の低周波数成分(2,0)についても実軸成分 $H_{2,0}$ が0であるかどうかを合わせて評価してもよい。さらに高周波の成分を用いてもよいが、高周波になるほどノイズの影響を受けやすいことに注意する。

[0095]

ここで、フーリエ変換の最低周波数成分(1,0)における角周波数 ω は、検査領域80の画素数Nを用いて、 $\omega=2\pi/N$ と表されることから、位置ずれkが画素数Nの半分である場合の位相角は ω $k=(2\pi/N)\times(N/2)=\pi$ であり、このときの最低周波数成分(1,0)は、虚軸 I m上の負の向きのベクトル93となる。このときが位置ずれkの検出限界となるから、最低周波数成分(1,0)の位相角 ω k によって検出可能な位置ずれkの範囲は $-N/2 \le k < N/2$ である。

[0096]

また、2番目の低周波数成分(2,0)における角周波数 ω は、 $\omega=4\pi/N$ であり、一般にフーリエ変換の周波数成分(i,0)における角周波数 ω は、 $\omega=(2\pi/N)\times i$ であるから、2番目の低周波数成分(2,0)をエッジ検出に用いた場合、検出可能な位置ずれkの範囲は、 $-N/4 \le k < N/4$ に狭まる。一般に周波数成分(i,0)を用いた場合、検出可能な位置ずれkの範囲は、 $-N/(2i) \le k < N/(2i)$ に狭まる

[0097]

10

20

30

20

50

図16(a)~(d)では、検査領域80のフーリエ変換の最低水平周波数成分すなわち(1,0)成分の実軸成分 $H_{1,0}$ により横方向のエッジの検出が可能であることを説明したが、同様に、検査領域80のフーリエ変換の最低垂直周波数成分すなわち(0,1)成分の実軸成分 $H_{0,1}$ により縦方向のエッジの検出が可能である。

[0098]

図17は、図14のステップS72の縦方向走査の停止条件を説明する図である。検査領域80を縦方向に1画素ずつシフトして縦方向の走査を続け、同図のように、検査領域80内に原画像領域20の頂点Aが入ったとする。このとき検査領域の中心点(検査点) Vは、原画像領域20のエッジライン上にあるが、原画像領域20の頂点Aからずれている。

[0099]

このとき、検査領域 8 0 の中心点 V が原画像領域 2 0 の上辺のエッジラインからずれているために、検査領域 8 0 のフーリエ変換の低周波垂直成分すなわち(0 , 1)成分の実軸成分 H_{0} , 1 の値は非零である。縦方向走査により、検査領域 8 0 内に原画像領域 2 0 の頂点 A が入ることにより、(0 , 1)成分の実軸成分 H_{0} , 1 の値に変化が生じるため、この変化をとらえて、縦方向走査を終了する。ステップ S 7 2 では(0 , 1)成分の実軸成分 H_{0} , 1 の変化量と所定の閾値の大小関係にもとづいて停止の判定を行ったが、これに代えて、実軸成分 H_{0} , 1 と所定の閾値の大小関係にもとづいて停止の判定を行ってもよい。この場合、図 1 4 のステップ S 7 1 の処理は不要である。縦方向走査の停止時点での検査点 V をエッジラインの端点とみなし、検査点 V の座標値を暫定頂点 V e の座標値として取得する。

[0100]

図18は、図13の横方向走査処理S56の詳細な手順を説明するフローチャートである。横方向走査処理S56は、図14の縦方向走査処理S54と走査方向が異なるだけで、処理としては同じである。なお、ここでは、左上の頂点Aを検出場合を説明する。

[0101]

エッジ追跡部44は、検査点Vのy座標値を示す変数 j から走査幅 d の 1 / 2 を減算することにより、検査点Vのスタート位置を設定する(S 8 0)。エッジ追跡部44は、検査点V(i, j)を中心とする縦横N画素の検査領域にフーリエ変換処理を施す(S 8 2)。エッジ追跡部44は、検査領域のフーリエ変換の(0, 1)成分の実軸成分 H_0 , 1 を取得し(S 8 4)、実軸成分 H_0 , 1 が0 でない場合(S 8 6 のN)、y座標値 j を1だけインクリメントして、検査点Vをy軸方向に移動させ(S 8 8)、新しい検査点Vについてフーリエ変換処理S 8 2 を続ける。

[0102]

[0103]

なお、図18では、左上の頂点Aを横方向に探索して検出する場合を説明した。左下の頂点Bを検出する場合は、ステップS80において、検査点Vのy座標値jがj+d/2に設定され、ステップS88において、検査点Vのy座標値jが1だけデクリメントされるように変更する。また、右上の頂点Cを検出する場合は、ステップS94において、検査点Vのx座標値iが1だけインクリメントされるように変更する。また、右下の頂点Dを検出する場合は、ステップS80において、検査点Vのy座標jがj+d/2に設定され、ステップS88において、検査点Vのy座標値jが1だけデクリメントされ、ステッ

20

30

40

50

プS94において、検査点Vのx座標値iが1だけインクリメントされるように変更する

[0104]

図14の縦方向走査処理S54および図18の横方向走査処理S56では、検査点を1 画素ずつシフトさせて、その都度、検査領域に対するフーリエ変換を求めた。しかしながら、図16(a)~(d)で説明したように、検査領域80の中心点Vとエッジラインとのずれkが、フーリエ変換後の空間では、虚軸Imとなす位相角ωkとして現れることを利用すれば、位相角ωkを角周波数ωで除算することにより、位置ずれkを求めることができる。したがって、検査領域80内にエッジラインが入った時点でのフーリエ変換処理の結果から、検査領域80の中心点Vとエッジラインのずれkを算出して、その後の検査領域80の走査とフーリエ変換処理を省略して、エッジラインの位置を求めてもよい。この方法によれば、フーリエ変換処理の回数を減らすことができる。

[0105]

図19は、図9の頂点位置特定処理S24の詳細な手順を説明するフローチャートである。この処理において、頂点特定部40のフーリエ変換処理部46および位相角算出部47は、暫定頂点Veの位置ずれ検出処理を行い、真の頂点の位置に対する暫定頂点Veのx軸方向のずれdiff_yとを求める。

[0106]

図20(a)、(b)は、暫定頂点Veの位置ずれを説明する図である。図20(a)は、縦方向走査処理S54または横方向走査処理S56の走査が終わった時点での検査領域80と原画像領域20の関係を示す。検査領域80の中心点すなわち暫定頂点Ve(i。,j。)は、原画像領域20の真の頂点Aの位置からx軸方向にdiff_x、y軸方向にdiff_yだけずれている。このようなずれが生じるのは、縦方向走査処理S54および横方向走査処理S56では、検査領域80内に原画像領域20の頂点が入った時点で、走査を停止し、それ以降の探索を行わないためである。また、ノイズの影響により、エッジの追跡だけでは正確な頂点位置を判定できないためでもある。

[0107]

図20(b)は、検査領域80の中心点すなわち暫定頂点Veと、原画像領域20の頂点Aとが一致している理想的な状態を示したものである。図20(b)の理想的な状態における検査領域80の画像は参照画像として、図20(a)の実際の検査領域80における暫定頂点Veの位置ずれの調整のために利用される。

[0108]

頂点特定部40のフーリエ変換処理部46は、図13の縦方向走査処理S54または横方向走査処理S56により得られた暫定頂点Veのx座標値i。、y座標値j。をそれぞれ変数i,jに代入し(S100)、暫定頂点Veを中心とする所定のサイズの頂点周辺画像を抽出する(S110)。この頂点周辺画像として、図20(a)に示した暫定頂点Veを中心とする縦横N画素の検査領域80を用いることができる。

[0109]

次に、フーリエ変換処理部46は、暫定頂点Veの位置ずれを検出するために、頂点周辺画像と同一サイズの参照画像を設定する(S 1 1 2)。この参照画像として、図 2 0 (b)に示した原画像領域 2 0 の頂点Aを中心とする縦横N画素の検査領域 8 0 を用いることができる。原画像の4隅の画像を何らかの形で事前に取得しておき、余白部分が白色の場合、4隅の画像を背景が白地の画像に貼り付けることで、図 2 0 (b)の参照画像を生成することができる。あるいは、図 2 0 (b)の参照画像は、白地の背景に図 2 0 (a)の原画像領域 2 0 の輝度値と実質的に同一な輝度値をもつ画像を人工的に生成して貼り付けることにより生成してもよい。

[0110]

フーリエ変換処理部46は、頂点周辺画像と参照画像のそれぞれにフーリエ変換処理を施す(S 1 1 4)。位相角算出部47は、頂点周辺画像と参照画像のそれぞれのフーリエ変換の最低水平周波数成分すなわち(1,0)成分の位相角α₁、α₂を算出する(S 1

20

30

40

50

16)。また、位相角算出部47は、頂点周辺画像と参照画像のそれぞれのフーリエ変換の最低垂直周波数成分すなわち(0,1)成分の位相角β₁、β₂を算出する(S118)。

[0111]

16

頂点位置ずれ調整部 48 は、暫定頂点 V e の y 軸方向の位置ずれ d i f f __ y を $(\alpha_2 - \alpha_1)$ / $(2\pi/N)$ により算出し(S 1 2 0)、暫定頂点 V e の x 軸方向の位置ずれ d i f f __ x を $(\beta_2 - \beta_1)$ / $(2\pi/N)$ により算出する(S 1 2 2)。

[0112]

[0113]

図 2 1 は、頂点周辺画像と参照画像のフーリエ変換の低周波数成分の位相角の関係を説明する図である。同図は、頂点周辺画像と参照画像のフーリエ変換の最低水平周波数成分すなわち(1,0)成分を実軸Reと虚軸Imからなる座標系の単位円上の点で示したものであり、頂点周辺画像のフーリエ変換の(1,0)成分120の位相角は α_1 、参照画像のフーリエ変換の(1,0)成分122の位相角は α_2 であり、位相差 $\Delta\alpha=\alpha_2-\alpha_1$ が生じる。この位相差は、暫定頂点Veが真の頂点の位置からy軸方向にdiff_iだけずれていることにより生じる。

[0114]

[0115]

また、上記のように頂点周辺画像と参照画像の両方を利用することにより、撮影部30による撮影時のノイズ等による悪影響を除去することができる。

[0116]

以上、画像領域判定処理S12の詳細な手順を図9~図21で説明した。上記の縦方向走査処理S54および横方向走査処理S56では、検査領域の画像のフーリエ変換の低周波数成分を評価することによりエッジを検出したが、エッジ検出フィルタを用いてエッジを検出してもよい。以下、エッジ検出フィルタによるエッジ検出手順を説明する。

[0117]

縦横N画素の検査領域に対して、横方向のエッジ、縦方向のエッジを検出するためのフィルタを設定し、畳み込み演算を利用したフィルタ演算の出力値を求める。ここではN=4の場合を説明する。検査領域の画像(以下、入力信号ともいう)をx(ⅰ,j)とし、フィルタ演算による出力信号をy(m,n)とする。またエッジ検出フィルタをh(ⅰ,j)とする。フィルタ演算を次式のタップ数L=4の畳み込み演算で行う。

y (m, n) = $\sum_{i=0}^{3} \sum_{j=0}^{3} h (m-i, n-j) x (i, j)$

[0118]

図22(a)~(c)は、エッジ検出フィルタト(i,j)と入力信号x(i,j)の例を説明する図である。図22(a)は、横方向のエッジを検出するフィルタト(i,j)と、そのフィルタを用いた畳み込み演算によるレスポンスが最も大きくなる入力信号x(i,j)を示す。ここで、エッジの方向は、エッジラインに垂直な方向に定義されてい

ることに注意する。

[0119]

図22(b)は、縦方向のエッジを検出するフィルタト(i, j)と、そのフィルタを用いた畳み込み演算によるレスポンスが最も大きくなる入力信号x(i, j)を示す。図22(c)は、左上の頂点を検出するフィルタト(i, j)と、そのフィルタを用いた畳み込み演算によるレスポンスが最も大きくなる入力信号x(i, j)を示す。

[0120]

図23は、エッジ検出フィルタによる縦方向走査処理S54を説明するフローチャートである。なお、ここでは、左上の頂点Aを検出場合を説明する。エッジ検出フィルタの出力信号の閾値を設定する(S130)。頂点探索開始点Vsのx座標値iから走査幅dの1/2を減算して、エッジの走査開始点を設定する(S132)。

[0121]

エッジ追跡部44は、検査点V(i, j)を中心とする縦横N画素の領域の2次元画像信号に対して、タップ数Lの横方向エッジ検出フィルタによる畳み込み演算を計算し、2次元出力信号 y 1 を求める(S134)。ここでタップ数Lは画素数Nに等しい。

[0122]

2次元出力信号y₁の値が閾値以下である場合(S136のN)、x座標値iを1だけインクリメントして、検査領域をx軸方向にシフトさせ(S138)、ステップS134のフィルタ演算を繰り返す。

[0123]

2次元出力信号 y 1 の値が閾値を超えた場合(S 1 3 6 の Y)、横方向のエッジが検出されたと判定し、次に、点(i, j)を中心とした 2 次元画像信号に対して、タップ数 L の縦方向エッジ検出フィルタによる畳み込み演算を計算し、 2 次元出力信号 y 2 を求める(S 1 4 0)。

[0124]

2次元出力信号y₂の値が閾値を超えた場合(S 1 4 2 の Y)、縦方向走査処理を終了しリターンする。2次元出力信号y₂の値が閾値以下である場合(S 1 4 2 の N)、y座標値jをタップLだけデクリメントして、左上の頂点Aを探索するために、検査領域を上向きにシフトさせ(S 1 4 4)、ステップS 1 3 2 以降のエッジ検出を継続する。

[0125]

なお、図23では、左上の頂点Aを縦方向に探索して検出する場合を説明した。左下の頂点Bを検出する場合は、ステップS144において、検査点Vのy座標値jがLだけインクリメントされるように変更する。また、右上の頂点Cを検出する場合は、ステップS132において、検査点Vのx座標値iがi+d/2に設定され、ステップS138において、検査点Vのx座標値iが1だけデクリメントされるように変更する。また、右下の頂点Dを検出する場合は、ステップS132において、検査点Vのx座標iがi+d/2に設定され、ステップS138において、検査点Vのx座標値iが1だけデクリメントされ、ステップS144において、検査点Vのy座標値jがLだけインクリメントされるように変更する。

[0126]

エッジ検出フィルタによる横方向走査処理S56についても、検出するエッジ方向と走査方向を変えれば、同様の手順で実施することができる。

[0127]

なお、図22(c)に示した頂点を検出するためのフィルタを用いれば、エッジ検出フィルタで頂点を検出することもできる。しかしながら、エッジ検出フィルタによる方法は、ノイズに弱いため、頂点の正確な位置を特定するには、フーリエ変換の低周波数成分を用いて位相差から位置ずれを求める方法が有効である。

[0128]

以上述べたように、実施の形態の電子透かし抽出装置200では、撮影画像に含まれる原画像領域を判定する際、検査領域を空間周波数領域に変換し、変換後の信号の位相角に

10

20

30

40

20

50

基づいて、原画像領域の頂点を高精度に求めることができる。空間周波数領域に変換したときの低周波数成分を利用するため、撮影画像に撮影による画像の歪みやノイズがある場合でも、正確に頂点を求めることができる。電子透かし抽出装置200は、このようにして原画像領域を正確に抽出した上で、撮影による歪みを補正し、補正された原画像領域から電子透かしを抽出するため、透かしの検出精度が向上する。

[0129]

以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

[0130]

そのような変形例として、上記の説明では、原画像領域20の4頂点をすべて特定し、4頂点の座標値をもとに原画像領域20を抽出したが、原画像領域20の対角線上にある2頂点のみを求めるように構成してもよい。撮影領域26の撮影による歪みが左右対称であるなら、対角線上にある2頂点の座標値から線対称を仮定して原画像領域20を抽出することが可能である。また、撮影画像の歪みが撮影機器のレンズによるものだけであるなら、原画像領域20のいずれかひとつの頂点のみを特定し、レンズ歪みが撮影領域26の中心に関して点対称であることを利用して、原画像領域20を抽出することも可能である

[0131]

上記の説明では、原画像領域20を抽出するために、フーリエ変換後の信号の位相角を利用して、原画像領域20の各頂点の座標値を高い精度で求めたが、同じ位相角を用いた方法で、原画像領域20の各辺を高い精度で求めてもよい。撮影による歪みにより原画像領域20の各辺は歪曲している。原画像領域20の各辺を正確に特定することで、原画像領域20をより厳密に抽出し、歪み補正の精度を高めることができる。

[0132]

上記の透かし検出処理において、透かし検出に失敗した場合、画像領域判定部32は、エッジ検出フィルタの閾値などのパラメータを変えて、原画像領域20の判定処理を再度行ってもよい。また、透かし検出に失敗した場合、画像補正部34が撮影部30に印刷画像Pの再撮影を要求してもよい。

[0133]

なお上記実施例では、エッジ検出フィルタ部42はPrewittオペレータを用いてエッジラインとエッジ方向を検出していたが、これに代えて、フーリエ変換フィルタを用いてエッジラインとエッジ方向を検出するものであっても良い。

[0134]

図24のフローチャートを参照して、フーリエ変換フィルタを用いたエッジライン及びエッジ方向の検出手順を説明する。なお、図24において、図10のエッジ検出処理S2 0の手順を示すフローチャートと処理を同じくする処理ステップについては同じステップ 番号を割り当て、かかる処理ステップについての説明は省略する。

[0135]

ステップS204では、検査点(i, j)を中心とした縦横N画素の検査領域80の輝 40度値に係る2次元FFTが行われる。ここではNは2のべき乗に相当する数(8、16、64等)である。

[0136]

ステップS205では、 H_r (1,0)、 H_r (0,1)、 H_i (1,0)、 H_i (0,1)の値が取得される。ここで H_r (x,y)、 H_i (x,y)の定義は、エッジ追跡部44の処理に関する説明で定義したものと同じである。

[0137]

ステップ S 2 0 6 では、上記 H_r (1, 0)、 H_r (0, 1)、 H_i (1, 0)、 H_i (0, 1)の全てが 0 であるかどうかが判断される。検査領域 8 0 内の全ての画素の輝度値は同じである場合、上記 4 変数は全てが 0 になる。ステップ S 3 6 で取得した走査開始

20

40

50

点が余白領域であるならば、ステップS206でyesと判定された場合は、検査領域80内は全て余白領域である。このとき、ステップS38において、検査点のx座標値iにアスペクト比width/heightを加算し、y座標値jに1を加算して、ステップS204に戻り、探索を続ける。

[0138]

ステップS206において、上記4変数のいずれかが0ではないと判断されたら、検査領域80内に余白領域と原画像領域20のエッジがあるものと判断される。

[0139]

ステップ S 2 0 9 では、 H_r (1, 0)、 H_r (0, 1)の両方が 0 であるかどうかが判断される。検査点(i, j)が余白領域と原画像領域 2 0 のエッジ上にある場合、この両方の変数が 0 になる。 H_r (1, 0)、 H_r (0, 1)の少なくとも一方が 0 でない場合 (S 2 0 9 の N)、ステップ S 3 8 において、検査点の x 座標値 i にアスペクト比w i d t h f h f e i g h f t f を加算し、f 座標値 f に 1 を加算して、ステップ S 2 0 4 に戻り、探索を続ける。

[0140]

 H_r (1,0)、 H_r (0,1)の両方が0である場合(S209のY)、ステップ S210において、 H_i (1,0)が0であるかどうかが判断される。 H_i (1,0)が0である場合(S2100Y)、前記エッジの方向が水平方向(x 軸方向)であると判断される(S211)。 H_i (1,0)が0でない場合(S2100N)、ステップ S206 において4変数 H_r (1,0)、 H_r (0,1)、 H_i (1,0)、 H_i (0,1)のいずれかが0ではなかったことから、 H_i (0,1)が0であることがわかり、前記エッジの方向が垂直方向(y 軸方向)であると判定される(S212)。このようにして、フーリエ変換フィルタを用いても、エッジラインとエッジ方向を検出することができる。

[0141]

また、上記実施例では、エッジ追跡部44が縦方向のエッジ走査処理(S 5 4)を行う際、検査点Vをx方向に走査させつつH_r(1,0)の値を評価することにより余白領域と原画像領域20のエッジ位置を特定していた。これに代えて、H_r(1,0)とH_i(1,0)から導かれるH(1,0)の位相角、すなわちarctan[H_i(1,0)/H_r(1,0)]が検査点とエッジ位置からの距離に比例する性質を利用して、前記位相角に基づいてエッジ位置を特定するものであっても良い。かかる方法によれば、撮影条件が良好ではない場合はエッジ位置を誤判定するおそれがあるが、検査点Vをx方向に走査させながらエッジ位置を特定する方法と比較すれば、エッジ位置の特定を高速に行うことができる。

[0142]

上記の実施例は、透かし入り画像の原画像領域20の頂点の検出に関するものであったが、上記で説明した頂点検出方法は、それ以外の一般的な画像においても適用できるものであり、特に電子透かしの用途に限られない。

【図面の簡単な説明】

[0143]

- 【図1】実施の形態に係る電子透かし埋め込み装置の構成図である。
- 【図2】図1の電子透かし埋め込み装置から出力される印刷画像を説明する図である。
- 【図3】実施の形態に係る電子透かし抽出装置の構成図である。
- 【図4】図3の電子透かし抽出装置により撮影された印刷画像を説明する図である。
- 【図5】図3の画像領域判定部の詳細な構成を説明する図である。
- 【図6】図5のエッジ検出部および頂点特定部により原画像領域が判定される様子を説明する図である。
- 【図7】原画像領域の撮影による歪みを説明する図である。
- 【図8】図3の電子透かし抽出装置による電子透かし抽出手順の全体的な流れを示すフローチャートである。
- 【図9】図8の画像領域判定処理の大まかな流れを示すフローチャートである。

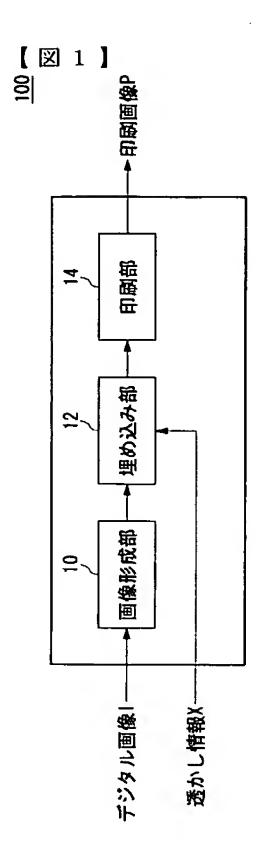
20

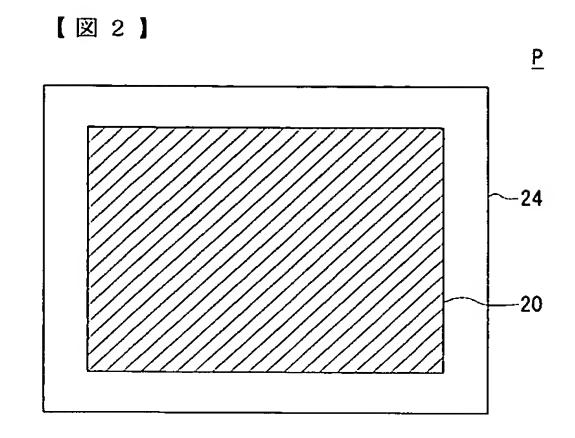
- 【図10】図9のエッジ検出処理の詳細な手順を示すフローチャートである。
- 【図11】エッジ検出フィルタを説明する図である。
- 【図12】エッジ検出フィルタにより原画像領域のエッジが検出される様子を説明する図である。
- 【図13】図9のエッジライン追跡処理の詳細な手順を説明するフローチャートである。
- 【図14】図13の縦方向走査処理の詳細な手順を説明するフローチャートである。
- 【図15】左上の頂点を探索する場合における縦方向走査処理が行われる様子を説明する図である。
- 【図16】検査領域のフーリエ変換の最低水平周波数成分により横方向のエッジが判定される原理を説明する図である。
- 【図17】図14の縦方向走査の停止条件を説明する図である。
- 【図18】図13の横方向走査処理の詳細な手順を説明するフローチャートである。
- 【図19】図9の頂点位置特定処理の詳細な手順を説明するフローチャートである。
- 【図20】暫定頂点の位置ずれを説明する図である。
- 【図21】頂点周辺画像と参照画像のフーリエ変換の低周波数成分の位相角の関係を説明する図である。
- 【図22】エッジ検出フィルタと入力信号の例を説明する図である。
- 【図23】エッジ検出フィルタによる縦方向走査処理を説明するフローチャートである。
- 【図24】フーリエ変換フィルタを用いたエッジライン及びエッジ方向の検出手順を説明するフローチャートである。

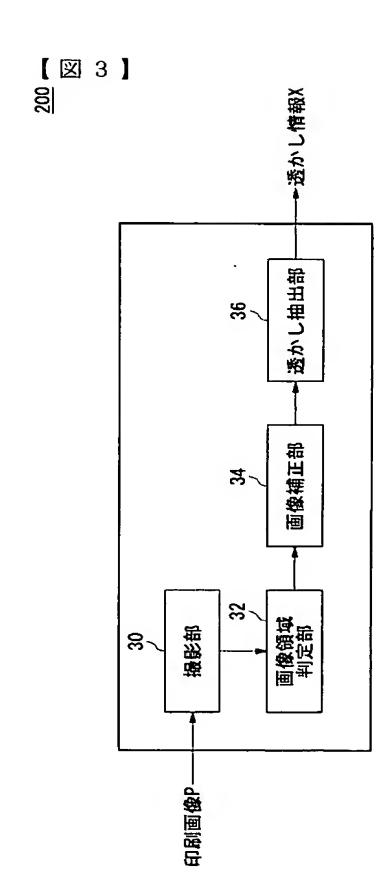
【符号の説明】

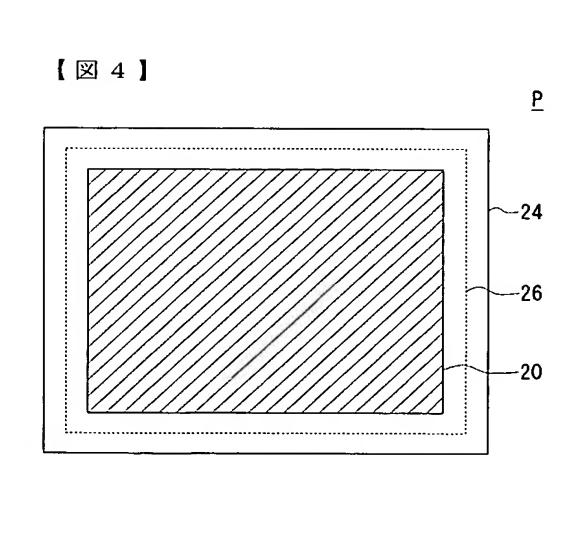
[0144]

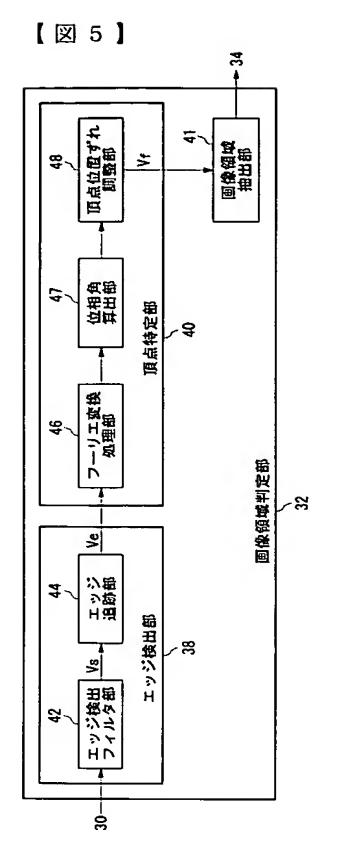
10 画像形成部、 12 埋め込み部、 14 印刷部、 20 原画像領域、 24 印刷媒体、 26 撮影領域、 30 撮影部、 32 画像領域判定部、 34 画像補正部、 36 透かし抽出部、 38 エッジ検出部、 40 頂点特定部、 41 画像領域抽出部、 42 エッジ検出フィルタ部、 44 エッジ追跡部、 46 フーリエ変換処理部、 47 位相角算出部、 48 頂点位置ずれ調整部、 100 電子透かし埋め込み装置、 200 電子透かし抽出装置。

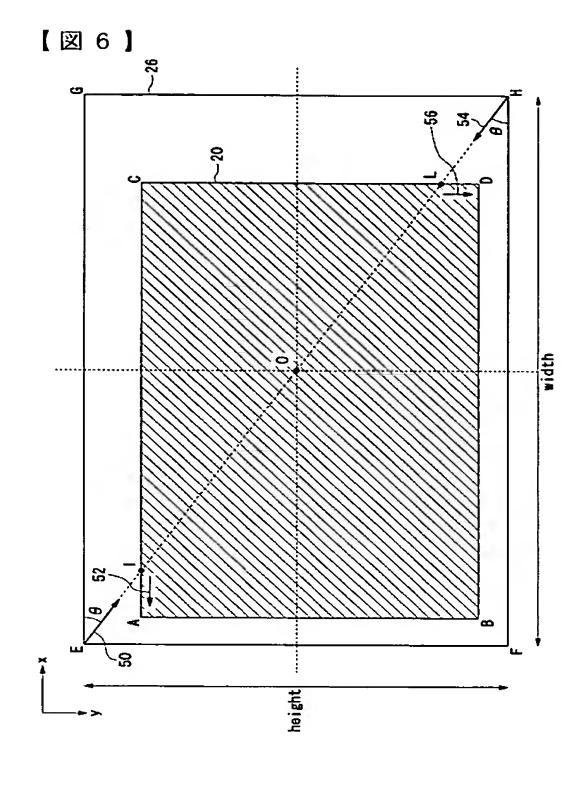


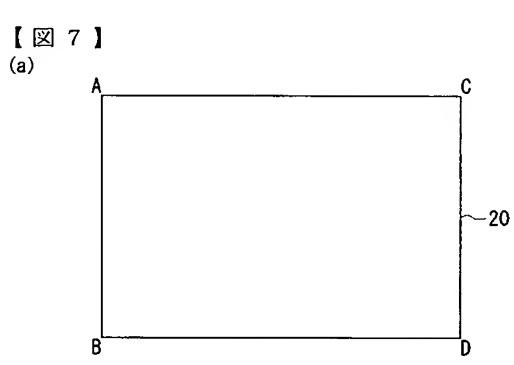


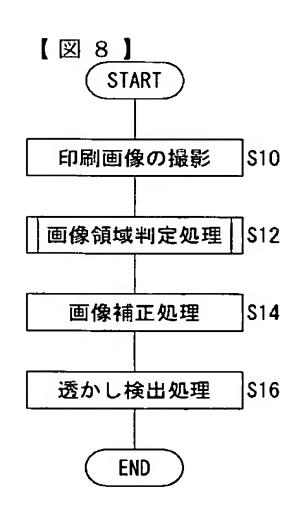


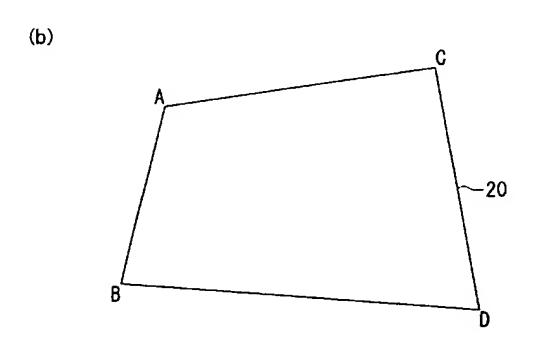


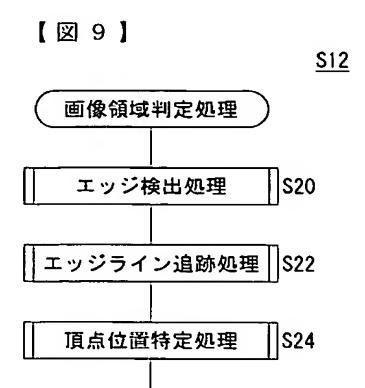




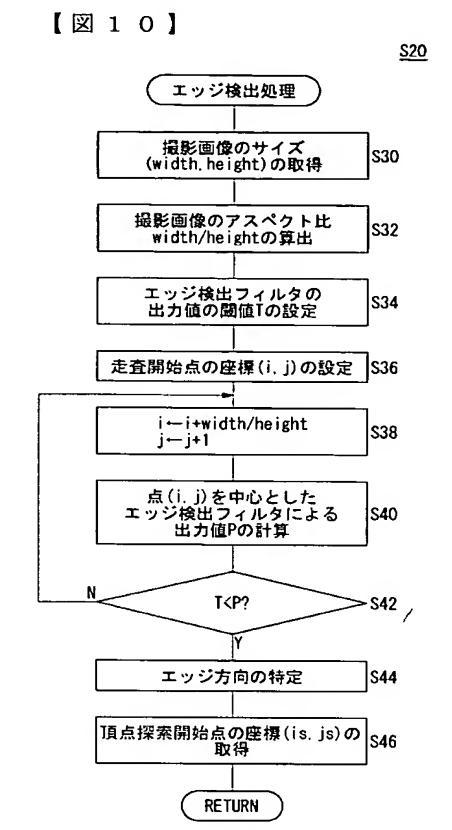


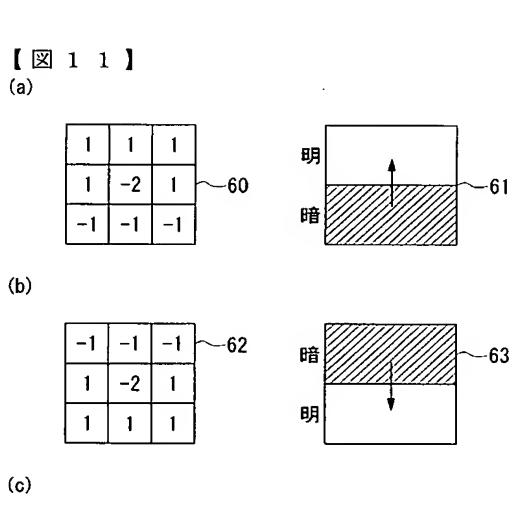


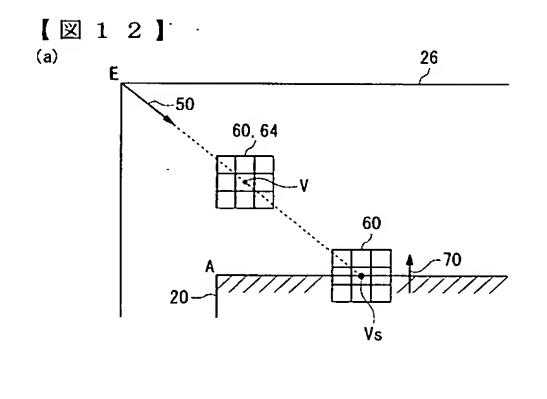


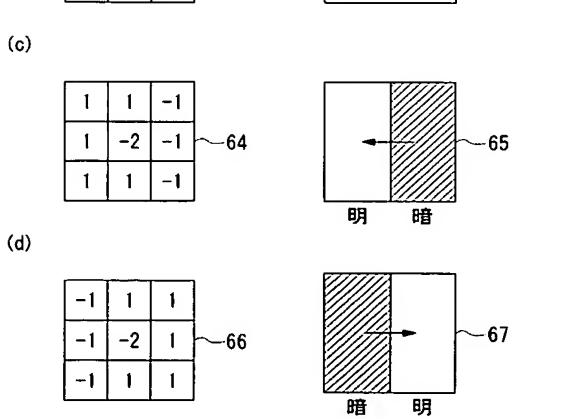


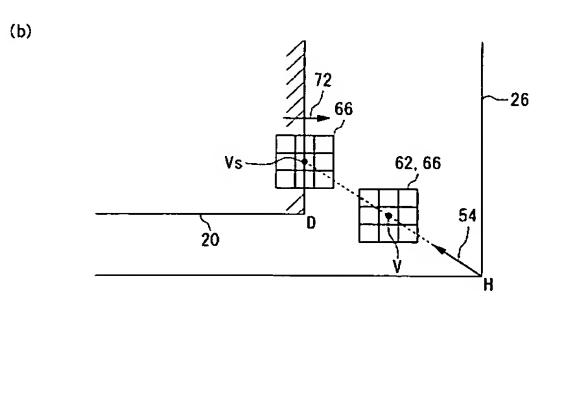
RETURN



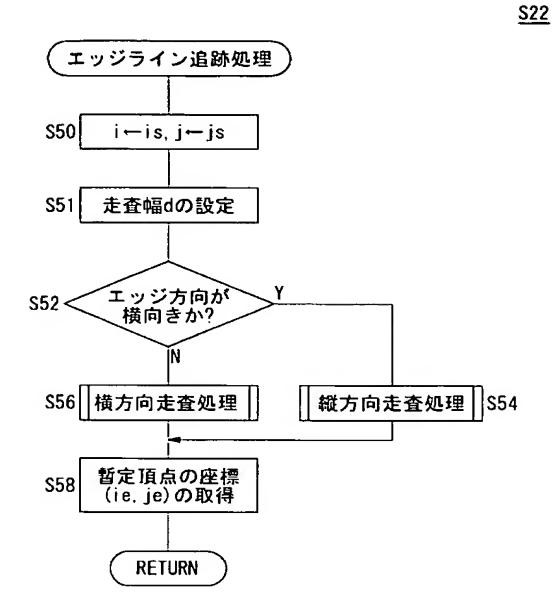




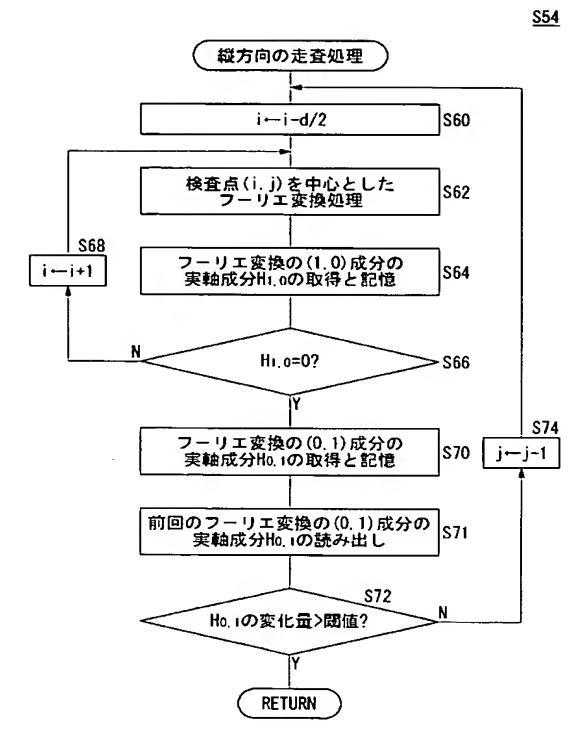




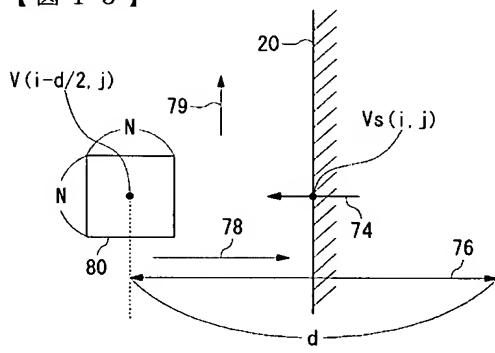
【図13】

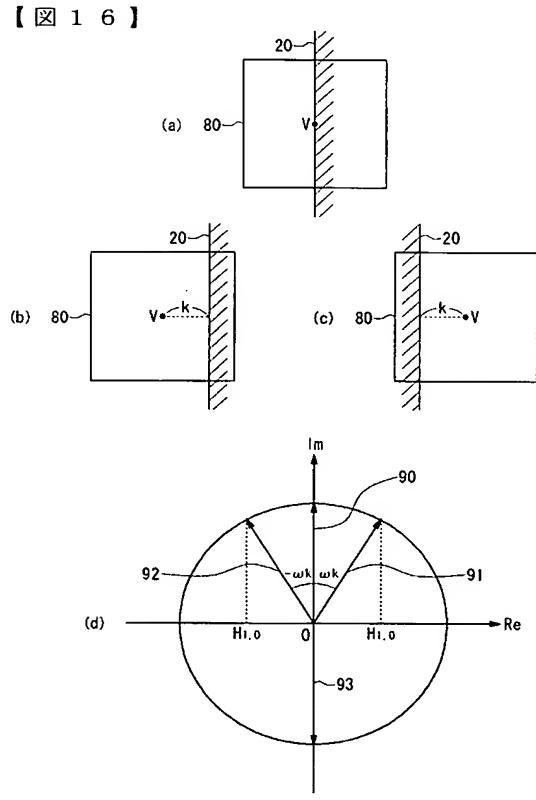


【図14】

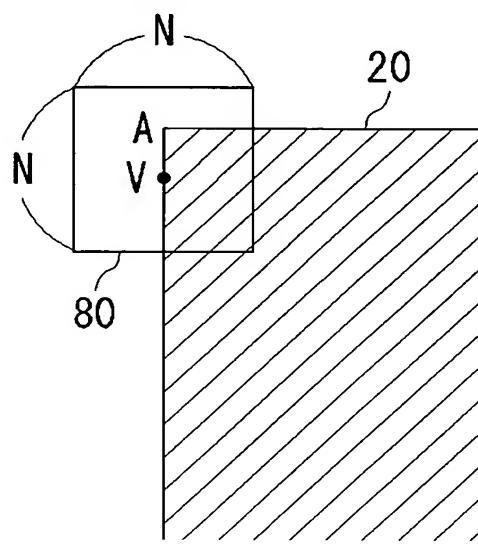


【図15】

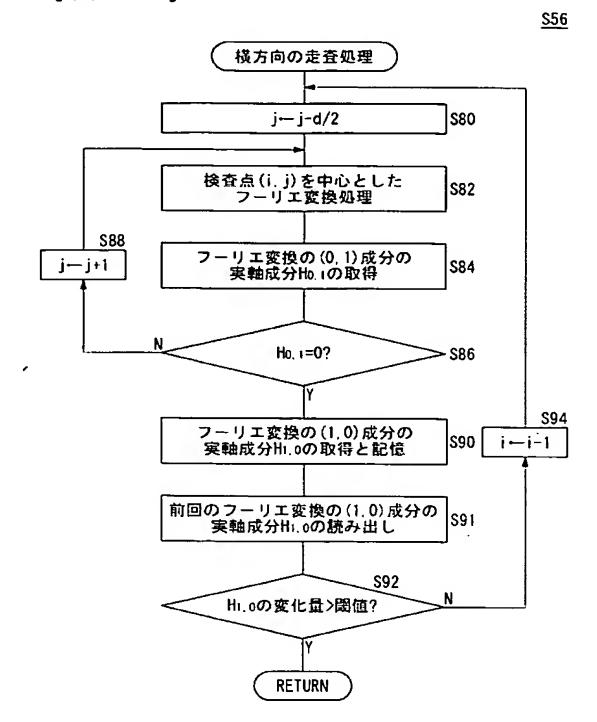




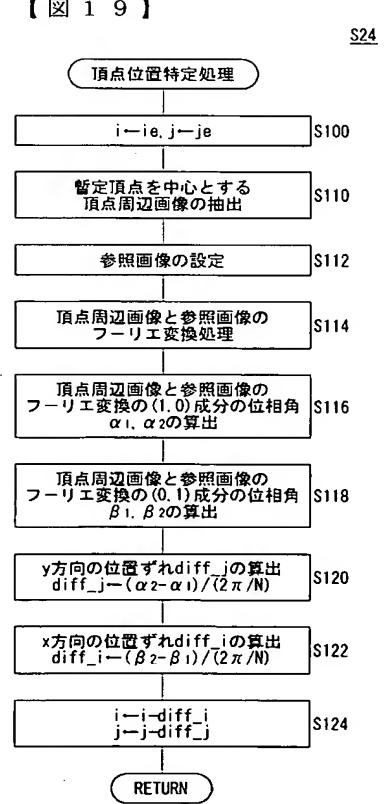
【図17】



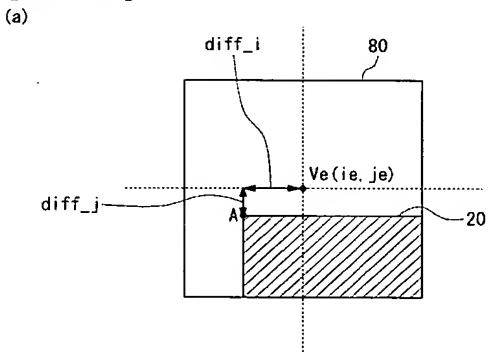
【図18】



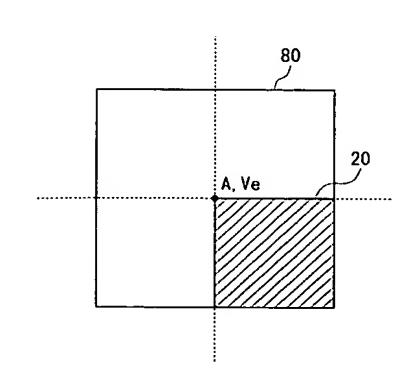
【図19】



【図20】



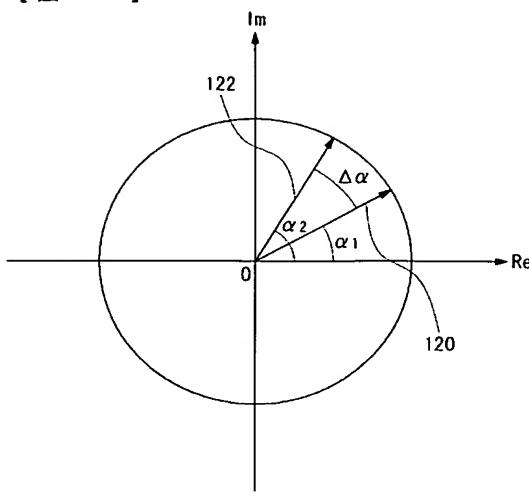


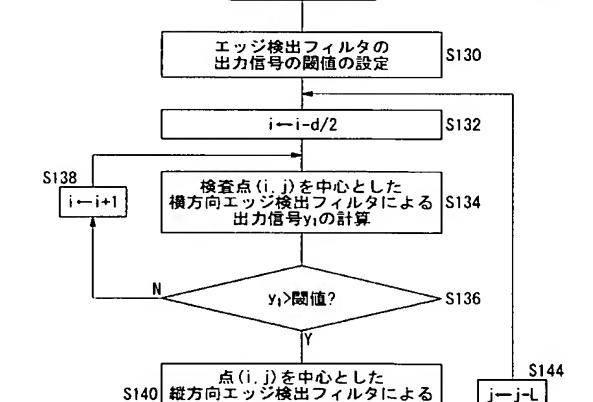


【図21】

【図23】

S142 <





出力信号y2の計算

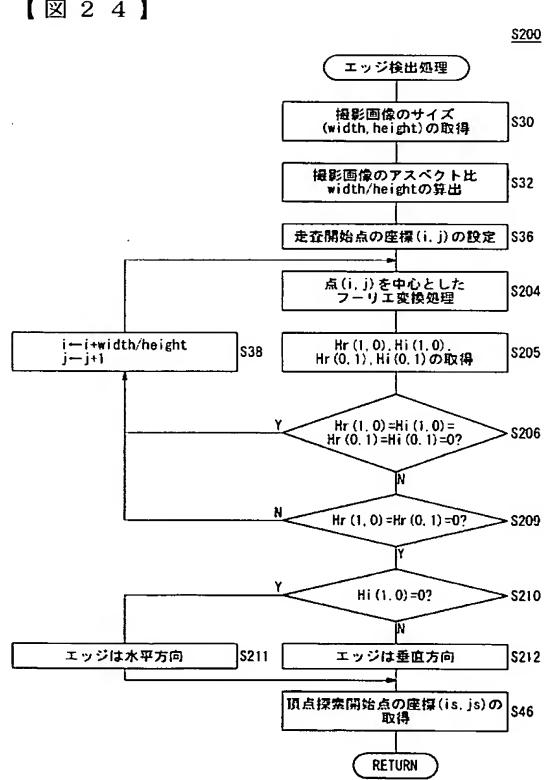
y₂>閾値?

RETURN

縦方向走査処理

【図24】

<u>S54</u>



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷

FI

テーマコード (参考)

H 0 4 N 1/387

G 0 6 T 7/60 1 5 0 B H 0 4 N 1/387

(72)発明者 井上 泰彰

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

Fターム(参考) 5B057 AA11 BA02 CA08 CA12 CA16 CB08 CB12 CB16 CD12 CG09

DA07 DB02 DB09 DC05 DC17 DC33

5C076 AA14 AA23 BA06

5L096 AA06 BA18 FA06 FA12 FA23 FA69